

○東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センターの利用設備等及び利用料に関する内規

平成 29 年 4 月 12 日

研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

改正 平成 29 年 6 月 30 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 29 年 10 月 17 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 2 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 4 月 2 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 5 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 30 年 11 月 2 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 31 年 1 月 9 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

平成 31 年 4 月 18 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和元年 10 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和元年 11 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 5 月 12 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 6 月 30 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 10 月 1 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 2 年 12 月 25 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 3 月 15 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 3 月 23 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 4 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 7 月 28 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定

令和 3 年 10 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 3 年 10 月 6 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 4 月 4 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 4 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 5 月 31 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 7 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 10 月 4 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 4 年 11 月 28 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 4 月 3 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 5 月 2 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

令和 5 年 8 月 1 日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

(趣旨)

第 1 条 この内規は、東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター設備等利用内規(平成 29 年 4 月 12 日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定)第 2 条及び第 10 条第 2 項の規定に基づき、東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター(以下「コアファシリティ統括センター」という。)に登録する共用可能な研究設備・機器(以下「設備等」という。)及び利用料について定める。

(設備等)

第 2 条 コアファシリティ統括センターに登録する共用可能な設備等のうち、コアファシリティ統括センター設備統合管理システム(以下「管理システム」という。)により利用申請する設備等(ただし、次項に該当する設備等は除く)及び利用料の額は、別表 1 に掲げるとおりとする。

2 コアファシリティ統括センターに登録する共用可能な設備等のうち、共同利用・共同研究拠点制度等に基づき運用される設備等及び利用料の額は、別表 2 に掲げるとおりとする。ただし、当該設備等のうち、管理システム以外のシステム等により利用申請する設備等の利用料は、別に定める。

附 則

1 この内規は、平成 29 年 4 月 12 日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。

2 東北大学研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンターの利用設備等及び利用料に関する内規(平成 20 年 2 月 20 日研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンター長裁定)は、廃止する。

附 則(平成 29 年 6 月 30 日改正)

この内規は、平成 29 年 7 月 1 日から施行する。

附 則(平成 29 年 10 月 17 日改正)

この内規は、平成 29 年 10 月 17 日から施行し、平成 29 年 10 月 1 日から適用する。

附 則(平成 30 年 2 月 1 日改正)

この内規は、平成 30 年 2 月 1 日から施行する。

附 則(平成 30 年 4 月 2 日改正)

この内規は、平成 30 年 4 月 2 日から施行し、平成 30 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(平成 30 年 5 月 28 日改正)

この内規は、平成 30 年 6 月 1 日から施行する。

附 則(平成 30 年 11 月 2 日改正)

この内規は、平成 30 年 11 月 2 日から施行し、平成 30 年 11 月 1 日から適用する。

附 則(平成 31 年 1 月 9 日改正)

この内規は、平成 31 年 1 月 9 日から施行し、平成 31 年 1 月 1 日から適用する。

附 則(平成 31 年 4 月 18 日改正)

この内規は、平成 31 年 4 月 18 日から施行し、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和元年 10 月 1 日改正)

この内規は、令和元年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和元年 11 月 1 日改正)

この内規は、令和元年 11 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 5 月 12 日改正)

この内規は、令和 2 年 5 月 12 日から施行し、令和 2 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和 2 年 6 月 30 日改正)

この内規は、令和 2 年 7 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 10 月 1 日改正)

この内規は、令和 2 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 2 年 12 月 25 日改正)

この内規は、令和 2 年 12 月 25 日から施行する。

附 則(令和 3 年 3 月 15 日改正)

この内規は、令和 3 年 3 月 23 日から施行する。

附 則(令和 3 年 3 月 23 日改正)

この内規は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

附 則(令和 3 年 4 月 28 日改正)

この内規は、令和 3 年 5 月 1 日から施行する。

附 則(令和 3 年 10 月 1 日改正)

この内規は、令和 3 年 10 月 1 日から施行する。

附 則(令和 3 年 10 月 6 日改正)

この内規は、令和 3 年 10 月 6 日から施行し、令和 3 年 10 月 1 日から適用する。

附 則(令和 4 年 4 月 4 日改正)

この内規は、令和 4 年 4 月 4 日から施行し、令和 4 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和 4 年 4 月 28 日改正)

この内規は、令和 4 年 5 月 1 日から施行する。

附 則(令和 4 年 5 月 31 日改正)

この内規は、令和 4 年 6 月 1 日から施行する。

附 則(令和 4 年 7 月 1 日改正)

この内規は、令和 4 年 7 月 1 日から施行する。

附 則(令和 4 年 10 月 4 日改正)

この内規は、令和 4 年 10 月 4 日から施行し、令和 4 年 10 月 1 日から適用する。

附 則(令和 4 年 11 月 28 日改正)

この内規は、令和 4 年 12 月 1 日から施行する。

附 則(令和 5 年 4 月 3 日改正)

この内規は、令和 5 年 4 月 3 日から施行し、令和 5 年 4 月 1 日から適用する。

附 則(令和 5 年 5 月 2 日改正)

この内規は、令和 5 年 5 月 2 日から施行し、令和 5 年 5 月 1 日から適用する。

附 則(令和 5 年 8 月 1 日改正)

この内規は、令和5年8月1日から施行する。

別表1(第2条第1項関係)

別表2(第2条第2項関係)

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等(その他必要経費)が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部門
417	パネル式クリーンブース 一式	日本エアータック PCB02-774522T6	学内	本人利用	2,627 円/ 時間	AIMR
418	熱分析装置 一式	リガク Thermo Plus Evo 2TD	学内	本人利用	2,357 円/ 時間	AIMR
418	熱分析装置 一式	リガク Thermo Plus Evo 2TD	学外	本人利用	2,842 円/ 時間	AIMR
529	多目的X線回折複合システム	リガクSmartLab9MTP、RASCO 3M	学内	本人利用	3,880 円/ 時間	AIMR
529	多目的X線回折複合システム	リガクSmartLab9MTP、RASCO 3M	学外	本人利用	6,827 円/ 時間	AIMR
530	形状解析レーザ顕微鏡	キーエンス VK-X1100/1000SP2606	学内	本人利用	1,828 円/ 時間	AIMR
530	形状解析レーザ顕微鏡	キーエンス VK-X1100/1000SP2606	学外	本人利用	3,021 円/ 時間	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	本人利用	788 円/ 時間	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	モデリングベース	1,106 円/ 枚	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	ABS樹脂材料	103 円/ cc	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学内	サポート樹脂材料	103 円/ cc	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	本人利用	913 円/ 時間	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	モデリングベース	1,106 円/ 枚	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	ABS樹脂材料	103 円/ cc	AIMR
554	3Dプリンターシステム	Stratasys uPrint SE	学外	サポート樹脂材料	103 円/ cc	AIMR
555	絶対PL量子収率測定装置	浜松ホトニクス Quantaaurus-QYC11347-01	学内	本人利用	3,049 円/ 時間	AIMR
555	絶対PL量子収率測定装置	浜松ホトニクス Quantaaurus-QYC11347-01	学外	本人利用	3,293 円/ 時間	AIMR
729	FTIR	JASCO FT/IR-6600	学内	本人利用	1,522 円/ 時間	AIMR
729	FTIR	JASCO FT/IR-6600	学外	本人利用	1,853 円/ 時間	AIMR
730	比表面積・細孔分布測定装置	Quantachrome Instruments QUADRASORB EVO4	学内	本人利用	1,143 円/ 時間	AIMR
730	比表面積・細孔分布測定装置	Quantachrome Instruments QUADRASORB EVO4	学外	本人利用	1,568 円/ 時間	AIMR
731	UV-Vis-NIR	JASCO V-770TWK	学内	本人利用	1,109 円/ 時間	AIMR
731	UV-Vis-NIR	JASCO V-770TWK	学外	本人利用	1,369 円/ 時間	AIMR
741	FE-SEM/EDS	日本電子JSM7800, Oxford X-Max	学内	本人利用	1,550 円/ 時間	AIMR
741	FE-SEM/EDS	日本電子JSM7800, Oxford X-Max	学外	本人利用	4,856 円/ 時間	AIMR
764	蛍光分光光度計	日立ハイテクサイエンス F-2700形	学内	本人利用	926 円/ 時間	AIMR
764	蛍光分光光度計	日立ハイテクサイエンス F-2700形	学外	本人利用	1,019 円/ 時間	AIMR
068	多目的X線結晶構造解析システム	リガク Smart Lab 3G	学内	本人利用	6,537 円/ 時間	MaSC
068	多目的X線結晶構造解析システム	リガク Smart Lab 3G	学外	本人利用	6,800 円/ 時間	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学内	本人利用	6,849 円/ 時間	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学内	試料吹付低温装置	1,747 円/ 時間	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学内	ガラス製キャピラリー	373 円/ 1本	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学内	石英製キャピラリー	855 円/ 1本	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学外	本人利用	7,269 円/ 時間	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学外	試料吹付低温装置	1,894 円/ 時間	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学外	ガラス製キャピラリー	373 円/ 1本	MaSC
069	多目的X線結晶構造解析システム	リガク VariMax DW with IP	学外	石英製キャピラリー	855 円/ 1本	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	本人利用	20,844 円/ 時間	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	Cuメッシュ	534 円/ 1枚	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	Moメッシュ	2,887 円/ 1枚	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	ピンタイプ(小)	107 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	ピンタイプ(大)	1,924 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	試料台チューブ	267 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	ピンスタブケース(大)	2,245 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	サンプルゲルケース	962 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	カーボンコート	534 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	窒素ガス	1,374 円/ 1本	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	液体窒素代	1,106 円/ 1回15ℓ	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	Dry Pump運転	5 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	ドライカラム	951 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学内	3D画像解析ソフト (Amira) ライセンス・ PC管理費用	120 円/ 時間	MaSC

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金 (円:税込)	管理部署
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	本人利用	22,162 円/ 時間	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	微細加工装置用試料低温装置	147 円/ 時間	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	Cuメッシュ	534 円/ 1枚	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	Moメッシュ	2,887 円/ 1枚	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	ピンタイプ(小)	107 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	ピンタイプ(大)	1,924 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	試料台チューブ	267 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	ピンスタブケース (大)	2,245 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	サンプルゲルケース	962 円/ 1個	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	カーボンコート	534 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	窒素ガス	1,374 円/ 1本	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	液体窒素代	1,106 円/ 1回15ℓ	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	Dry Pump運転	5 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	ドライカラム	951 円/ 1回	MaSC
070	微細加工システム FIB/SEMデュアルビームシステム	(株)FEI Electron Optics社製 Helios 600i	学外	3D画像解析ソフト (Amira) ライセンス・ PC管理費用	120 円/ 時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子(株)製 JXA-8530F	学内	本人利用	6,388 円/ 時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子(株)製 JXA-8530F	学内	軟X線分光器	331 円/ 時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子(株)製 JXA-8530F	学内	JSM-JEE-420Tまたは CADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/ 1回	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子(株)製 JXA-8530F	学外	本人利用	7,639 円/ 時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子(株)製 JXA-8530F	学外	軟X線分光器	978 円/ 時間	MaSC
072	電界放出型電子プローブマイクロアナライザ	日本電子(株)製 JXA-8530F	学外	JSM-JEE-420Tまたは CADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/ 1回	MaSC
073	多機能走査型X線光電子分光分析装置	アルバック・ファイ(株)製 PHI-5000 VersaProbe II -TSS	学内	本人利用	9,909 円/ 時間	MaSC
073	多機能走査型X線光電子分光分析装置	アルバック・ファイ(株)製 PHI-5000 VersaProbe II -TSS	学外	本人利用	10,399 円/ 時間	MaSC
074	顕微可視赤外分光システム	(株)東京インスツルメンツ NX-FLIM-TO3	学内	本人利用	4,243 円/ 時間	MaSC
074	顕微可視赤外分光システム	(株)東京インスツルメンツ NX-FLIM-TO3	学外	本人利用	4,863 円/ 時間	MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子(株)製 JSM-7800F	学内	本人利用	6,653 円/ 時間	MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子(株)製 JSM-7800F	学内	JSM-JEE-420Tまたは CADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/ 1回	MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子(株)製 JSM-7800F	学外	本人利用	7,710 円/ 時間	MaSC
099	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子(株)製 JSM-7800F	学外	JSM-JEE-420Tまたは CADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/ 1回	MaSC
100	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム (クロスセクションポリッシング)	日本電子(株)製 IB-09020CP	学内	本人利用	4,090 円/ 時間	MaSC
100	多種試料観察用走査電子顕微鏡システム (クロスセクションポリッシング)	日本電子(株)製 IB-09020CP	学外	本人利用	4,288 円/ 時間	MaSC
061	レオメータ	Brookfield RS-CPSコーンプレート型	学内	本人利用	2,671 円/ 時間	NICHe
061	レオメータ	Brookfield RS-CPSコーンプレート型	学外	本人利用	3,073 円/ 時間	NICHe
064	接触角・表面張力計	協和界面科学 DM-301	学内	本人利用	2,671 円/ 時間	NICHe
064	接触角・表面張力計	協和界面科学 DM-301	学外	本人利用	3,391 円/ 時間	NICHe
065	摩擦試験機	Bruker AXS UNMT-1MT-WS	学内	本人利用	2,380 円/ 時間	NICHe
065	摩擦試験機	Bruker AXS UNMT-1MT-WS	学外	本人利用	4,432 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学内	本人利用	10,229 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学内	委託利用	33,329 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学外	本人利用	10,941 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学外	委託利用	34,041 円/ 時間	NICHe
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント HNCD-4-SL #1	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学内	本人利用	10,229 円/ 時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学内	委託利用	33,329 円/ 時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学外	本人利用	10,941 円/ 時間	NICHe

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金 (円:税込)	管理部署
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学外	委託利用	34,041 円/ 時間	NICHe
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント HNCD-4-SL #2	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学内	本人利用	10,229 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学内	委託利用	33,329 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学外	本人利用	10,887 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学外	委託利用	33,987 円/ 時間	NICHe
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント HNCD-4-SL #3	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学内	本人利用	9,409 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学内	委託利用	32,509 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学外	本人利用	11,385 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学外	委託利用	34,485 円/ 時間	NICHe
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント HNCD	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
117	特殊型Siウェハ洗浄乾燥装置	エス・イー・エス 200SP	学内	本人利用	17,678 円/ 時間	NICHe
117	特殊型Siウェハ洗浄乾燥装置	エス・イー・エス 200SP	学内	委託利用	40,778 円/ 時間	NICHe
117	特殊型Siウェハ洗浄乾燥装置	エス・イー・エス 200SP	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
117	特殊型Siウェハ洗浄乾燥装置	エス・イー・エス 200SP	学外	本人利用	22,850 円/ 時間	NICHe
117	特殊型Siウェハ洗浄乾燥装置	エス・イー・エス 200SP	学外	委託利用	45,950 円/ 時間	NICHe
117	特殊型Siウェハ洗浄乾燥装置	エス・イー・エス 200SP	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学内	本人利用	52,593 円/ 時間	NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学内	委託利用	98,793 円/ 時間	NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学外	本人利用	55,658 円/ 時間	NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学外	委託利用	101,858 円/ 時間	NICHe
118	KrFステッパ	キヤノン FPA3000-EX3	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学内	本人利用	32,724 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学内	委託利用	78,924 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学外	本人利用	35,011 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学外	委託利用	81,211 円/ 時間	NICHe
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン Mark8	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学内	本人利用	2,802 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学内	委託利用	37,452 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学外	本人利用	3,197 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学外	委託利用	37,847 円/ 時間	NICHe
120	アライナー	ユニオン光学 EMA-400	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学内	本人利用	38,906 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学内	委託利用	73,556 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学外	本人利用	51,654 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学外	委託利用	86,304 円/ 時間	NICHe
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 EXCEED2300AH	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉 (α -8SE)	学内	本人利用	29,992 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉 (α -8SE)	学内	委託利用	53,092 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉 (α -8SE)	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉 (α -8SE)	学外	本人利用	31,845 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉 (α -8SE)	学外	委託利用	54,945 円/ 時間	NICHe
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン BEOL炉 (α -8SE)	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学内	本人利用	43,430 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学内	委託利用	66,530 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学外	本人利用	45,267 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学外	委託利用	68,367 円/ 時間	NICHe
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン RLSA 2B	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学内	本人利用	31,886 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学内	委託利用	54,986 円/ 時間	NICHe

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金 (円:税込)	管理部署
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学外	本人利用	36,507 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学外	委託利用	59,607 円/ 時間	NICHe
124	LPCVD装置	東京エレクトロン Formula	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置 (SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学内	本人利用	39,389 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置 (SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学内	委託利用	74,039 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置 (SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置 (SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学外	本人利用	45,976 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置 (SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学外	委託利用	80,626 円/ 時間	NICHe
125	マイクロ波プラズマCVD装置 (SiN)	東京エレクトロン LT-PECVD	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学内	本人利用	10,427 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学内	委託利用	33,527 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学外	本人利用	12,472 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学外	委託利用	35,572 円/ 時間	NICHe
126	常圧CVD装置	TEMPRESS PYROX-216E	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学内	本人利用	23,285 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学内	委託利用	57,935 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学外	本人利用	23,908 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学外	委託利用	58,558 円/ 時間	NICHe
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
132	特殊型室温枚葉洗浄装置A	リアライズ・アドバンステクノロジー 金属薄 膜用洗浄装置	学内	本人利用	27,746 円/ 時間	NICHe
132	特殊型室温枚葉洗浄装置A	リアライズ・アドバンステクノロジー 金属薄 膜用洗浄装置	学内	委託利用	50,846 円/ 時間	NICHe
132	特殊型室温枚葉洗浄装置A	リアライズ・アドバンステクノロジー 金属薄 膜用洗浄装置	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
132	特殊型室温枚葉洗浄装置A	リアライズ・アドバンステクノロジー 金属薄 膜用洗浄装置	学外	本人利用	30,331 円/ 時間	NICHe
132	特殊型室温枚葉洗浄装置A	リアライズ・アドバンステクノロジー 金属薄 膜用洗浄装置	学外	委託利用	53,431 円/ 時間	NICHe
132	特殊型室温枚葉洗浄装置A	リアライズ・アドバンステクノロジー 金属薄 膜用洗浄装置	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
133	特殊型密閉型洗浄装置B	リアライズ・アドバンステクノロジー	学内	本人利用	50,829 円/ 時間	NICHe
133	特殊型密閉型洗浄装置B	リアライズ・アドバンステクノロジー	学内	委託利用	73,929 円/ 時間	NICHe
133	特殊型密閉型洗浄装置B	リアライズ・アドバンステクノロジー	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
133	特殊型密閉型洗浄装置B	リアライズ・アドバンステクノロジー	学外	本人利用	56,375 円/ 時間	NICHe
133	特殊型密閉型洗浄装置B	リアライズ・アドバンステクノロジー	学外	委託利用	79,475 円/ 時間	NICHe
133	特殊型密閉型洗浄装置B	リアライズ・アドバンステクノロジー	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学内	本人利用	20,814 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学内	委託利用	67,014 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学外	本人利用	30,083 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学外	委託利用	76,283 円/ 時間	NICHe
134	電子ビーム露光装置	クレストック CABL-9520CE	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学内	本人利用	39,718 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学内	委託利用	62,818 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学外	本人利用	42,144 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学外	委託利用	65,244 円/ 時間	NICHe
135	RTA装置B	光洋サーモシステム RLA-1208-V	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジー VD-8-300S	学内	本人利用	17,472 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジー VD-8-300S	学内	委託利用	63,672 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジー VD-8-300S	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジー VD-8-300S	学外	本人利用	19,413 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジー VD-8-300S	学外	委託利用	65,613 円/ 時間	NICHe
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジー VD-8-300S	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学内	本人利用	15,186 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学内	委託利用	49,836 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学外	本人利用	15,359 円/ 時間	NICHe

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金 (円:税込)	管理部署
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学外	委託利用	50,009 円/ 時間	NICHe
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック IZU-2500H	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置 (プラズマ平坦化)	和泉テック	学内	本人利用	14,033 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置 (プラズマ平坦化)	和泉テック	学内	委託利用	37,133 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置 (プラズマ平坦化)	和泉テック	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置 (プラズマ平坦化)	和泉テック	学外	本人利用	14,832 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置 (プラズマ平坦化)	和泉テック	学外	委託利用	37,932 円/ 時間	NICHe
147	オールメタル装置 (プラズマ平坦化)	和泉テック	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
154	CMP後洗浄装置	リアライズ・アドバンステクノロジー	学内	本人利用	24,240 円/ 時間	NICHe
154	CMP後洗浄装置	リアライズ・アドバンステクノロジー	学内	委託利用	47,340 円/ 時間	NICHe
154	CMP後洗浄装置	リアライズ・アドバンステクノロジー	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
154	CMP後洗浄装置	リアライズ・アドバンステクノロジー	学外	本人利用	25,263 円/ 時間	NICHe
154	CMP後洗浄装置	リアライズ・アドバンステクノロジー	学外	委託利用	48,363 円/ 時間	NICHe
154	CMP後洗浄装置	リアライズ・アドバンステクノロジー	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
155	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテックサイエンス (エスアイアイ・ナノテクノロジー) SEA1000A	学内	本人利用	7,663 円/ 時間	NICHe
155	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテックサイエンス (エスアイアイ・ナノテクノロジー) SEA1000A	学内	委託利用	30,763 円/ 時間	NICHe
155	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテックサイエンス (エスアイアイ・ナノテクノロジー) SEA1000A	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
155	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテックサイエンス (エスアイアイ・ナノテクノロジー) SEA1000A	学外	本人利用	8,191 円/ 時間	NICHe
155	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテックサイエンス (エスアイアイ・ナノテクノロジー) SEA1000A	学外	委託利用	31,291 円/ 時間	NICHe
155	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテックサイエンス (エスアイアイ・ナノテクノロジー) SEA1000A	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学内	本人利用	10,274 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学内	委託利用	33,374 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学外	本人利用	11,404 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学外	委託利用	34,504 円/ 時間	NICHe
156	パーティクル検査装置A	トプコン WM2500	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
157	XRD	PANalytical/Spectris X'pert MRD	学内	本人利用	10,409 円/ 時間	NICHe
157	XRD	PANalytical/Spectris X'pert MRD	学内	委託利用	56,609 円/ 時間	NICHe
157	XRD	PANalytical/Spectris X'pert MRD	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
157	XRD	PANalytical/Spectris X'pert MRD	学外	本人利用	11,116 円/ 時間	NICHe
157	XRD	PANalytical/Spectris X'pert MRD	学外	委託利用	57,316 円/ 時間	NICHe
157	XRD	PANalytical/Spectris X'pert MRD	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
158	分光エリブソメトリー	堀場製作所 UVISEL/M200-VIS	学内	本人利用	14,683 円/ 時間	NICHe
158	分光エリブソメトリー	堀場製作所 UVISEL/M200-VIS	学内	委託利用	37,783 円/ 時間	NICHe
158	分光エリブソメトリー	堀場製作所 UVISEL/M200-VIS	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
158	分光エリブソメトリー	堀場製作所 UVISEL/M200-VIS	学外	本人利用	15,466 円/ 時間	NICHe
158	分光エリブソメトリー	堀場製作所 UVISEL/M200-VIS	学外	委託利用	38,566 円/ 時間	NICHe
158	分光エリブソメトリー	堀場製作所 UVISEL/M200-VIS	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器 (ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学内	本人利用	8,051 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器 (ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学内	委託利用	54,251 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器 (ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器 (ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学外	本人利用	8,726 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器 (ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学外	委託利用	54,926 円/ 時間	NICHe
159	低温プローバ	ナガセ電子機器 (ナガセテクノエンジニアリング) ARK-LIPS	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学内	本人利用	7,276 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学内	委託利用	30,376 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学外	本人利用	7,781 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学外	委託利用	30,881 円/ 時間	NICHe
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創 WXS-90S-L2	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学内	本人利用	14,473 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学内	委託利用	60,673 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学外	本人利用	16,331 円/ 時間	NICHe
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学外	委託利用	62,531 円/ 時間	NICHe

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金（円：税込）	管理部門
161	FE-SEM	日本電子 JSM-6700F	学外	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	23,100 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学内	委託利用	23,100 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学内	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学外	本人利用	148 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学外	委託利用	23,248 円/ 時間	NICHe
162	顕微鏡	オリンパス MX50	学外	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S	学内	本人利用	6,109 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S	学内	委託利用	29,209 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S	学内	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S	学外	本人利用	6,188 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S	学外	委託利用	29,288 円/ 時間	NICHe
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気） VR-120S	学外	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
165	段差計	Bruker Nano DECTAK	学内	本人利用	205 円/ 時間	NICHe
165	段差計	Bruker Nano DECTAK	学内	委託利用	23,305 円/ 時間	NICHe
165	段差計	Bruker Nano DECTAK	学内	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
165	段差計	Bruker Nano DECTAK	学外	本人利用	618 円/ 時間	NICHe
165	段差計	Bruker Nano DECTAK	学外	委託利用	23,718 円/ 時間	NICHe
165	段差計	Bruker Nano DECTAK	学外	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学内	本人利用	3,399 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学内	委託利用	26,499 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学内	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学外	本人利用	5,361 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学外	委託利用	28,461 円/ 時間	NICHe
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン S300M-973	学外	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/ イズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学内	本人利用	2,266 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/ イズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学内	委託利用	25,366 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/ イズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学内	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/ イズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学外	本人利用	2,926 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/ イズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学外	委託利用	26,026 円/ 時間	NICHe
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1_f/ イズ計測システム付	Cascade Microtech SQ-S11861B	学外	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
168	薄膜密度計	NEC三栄 MH4000	学内	本人利用	205 円/ 時間	NICHe
168	薄膜密度計	NEC三栄 MH4000	学内	委託利用	23,305 円/ 時間	NICHe
168	薄膜密度計	NEC三栄 MH4000	学内	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
168	薄膜密度計	NEC三栄 MH4000	学外	本人利用	332 円/ 時間	NICHe
168	薄膜密度計	NEC三栄 MH4000	学外	委託利用	23,432 円/ 時間	NICHe
168	薄膜密度計	NEC三栄 MH4000	学外	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学内	本人利用	6,359 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学内	委託利用	29,459 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学内	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学外	本人利用	7,212 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学外	委託利用	30,312 円/ 時間	NICHe
169	n&k測定装置	n&k Technology	学外	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学内	本人利用	3,032 円/ 時間	NICHe
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学内	委託利用	26,132 円/ 時間	NICHe
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学内	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学外	本人利用	3,780 円/ 時間	NICHe
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学外	委託利用	26,880 円/ 時間	NICHe
170	水銀プローブ	雄山 CVmap92A	学外	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学内	本人利用	4,569 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学内	委託利用	39,219 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学内	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学外	本人利用	6,774 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学外	委託利用	41,424 円/ 時間	NICHe
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡	サカタ理化学 N9455A	学外	技術指導料：オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
336	MSEP-PVクラスタ	大亜真空製	学内	本人利用	12,323 円/ 時間	NICHe
336	MSEP-PVクラスタ	大亜真空製	学内	委託利用	46,973 円/ 時間	NICHe

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金 (円:税込)	管理部門
336	MSEP-PVクラスタ	大亜真空製	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
336	MSEP-PVクラスタ	大亜真空製	学外	本人利用	13,143 円/ 時間	NICHe
336	MSEP-PVクラスタ	大亜真空製	学外	委託利用	47,793 円/ 時間	NICHe
336	MSEP-PVクラスタ	大亜真空製	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	17,325 円/ 時間	NICHe
365	差動排気型光電子分光分析 (XPS)装置	ScientaOmicron R4000 HiPP-2型	学内	本人利用	1,475 円/ 時間	NICHe
365	差動排気型光電子分光分析 (XPS)装置	ScientaOmicron R4000 HiPP-2型	学外	本人利用	3,444 円/ 時間	NICHe
366	薄膜表面評価用インプレーンX線回折装置	リガク SmartLab90TF	学内	本人利用	2,494 円/ 時間	NICHe
366	薄膜表面評価用インプレーンX線回折装置	リガク SmartLab90TF	学外	本人利用	6,996 円/ 時間	NICHe
368	マクロトライボロジー試験機	BrukerAX UMT3-HTRD	学内	本人利用	2,352 円/ 時間	NICHe
368	マクロトライボロジー試験機	BrukerAX UMT3-HTRD	学外	本人利用	3,726 円/ 時間	NICHe
369	顕微赤外分光装置	日本分光 フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-6300), 赤外顕微鏡(IRT-5000)	学内	本人利用	1,744 円/ 時間	NICHe
369	顕微赤外分光装置	日本分光 フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-6300), 赤外顕微鏡(IRT-5000)	学外	本人利用	3,112 円/ 時間	NICHe
370	マイクロビッカース硬度計	島津製作所 HMV-21DT	学内	本人利用	1,984 円/ 時間	NICHe
370	マイクロビッカース硬度計	島津製作所 HMV-21DT	学外	本人利用	2,324 円/ 時間	NICHe
371	表面粗さ測定機	ミットヨ SV-3100S4	学内	本人利用	1,971 円/ 時間	NICHe
371	表面粗さ測定機	ミットヨ SV-3100S4	学外	本人利用	2,375 円/ 時間	NICHe
517	共振ざり測定装置	アルバック理工株式会社	学内	本人利用	41,756 円/ 日	NICHe
517	共振ざり測定装置	アルバック理工株式会社	学外	本人利用	73,036 円/ 日	NICHe
517	共振ざり測定装置	アルバック理工株式会社	学外	分光システム	2,747 円/ 日	NICHe
645	ボール・オン・リング型 摩擦試験機	(英) Phenix Tripology社製 TE54	学内	本人利用	1,986 円/ 時間	NICHe
645	ボール・オン・リング型 摩擦試験機	(英) Phenix Tripology社製 TE54	学外	本人利用	16,270 円/ 時間	NICHe
646	摩擦磨耗試験機	(株) スター精機 UED08-3	学内	本人利用	1,965 円/ 時間	NICHe
646	摩擦磨耗試験機	(株) スター精機 UED08-3	学外	本人利用	2,148 円/ 時間	NICHe
647	クリーンルーム		学外	本人利用	577 円/ 時間	NICHe
647	クリーンルーム		学外	本人利用	577 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学内	本人利用	15,878 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学内	委託利用	33,203 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学内	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学外	本人利用	16,529 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学外	委託利用	33,854 円/ 時間	NICHe
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置	TREX 610	学外	技術指導料: オペトレ、 利用補佐、トラブル対応	11,550 円/ 時間	NICHe
719	超微量粘度計		学内	本人利用	5,893 円/ 時間	NICHe
719	超微量粘度計		学外	本人利用	6,688 円/ 時間	NICHe
775	微細表面構造計測顕微鏡	島津製作所 SFT-3500	学内	本人利用	2,617 円/ 時間	NICHe
775	微細表面構造計測顕微鏡	島津製作所 SFT-3500	学外	本人利用	6,415 円/ 時間	NICHe
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学内	本人利用	75,690 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学内	フラックス測定 (重イオ ン): 照射中のフラク スをPSでモニター	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学内	フラックス測定 (プロト ン): 照射中のフラク スをSEMでモニター	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学内	ビームプロファイル測定: GAFCHROMICフィルムに よるビームプロファイル測 定	17,850 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更: 重イ オン照射における核種変 更 (8:00~18:00)	26,880 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更: 重イ オン照射における核種変 更 (5:00~8:00, 18:00~ 22:00)	30,975 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更: 重イ オン照射における核種変 更 (22:00~翌5:00)	35,070 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学内	中性子エネルギースペク トル測定: 液体シンチ レーターによる中性子エ ネルギースペクトル測定	25,200 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学内	中性子フラックス測定: ビームカレントをモニター し、1秒あたりのフラク クスデータを提供	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学内	深夜・休日対応: 土日、 休日、深夜の対応 (測定 準備、トラブル対応等)	6,300 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学外	本人利用	94,095 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー: 陽子・中性子70MeV及 び重イオンビーム	学外	フラックス測定 (重イオ ン): 照射中のフラク スをPSでモニター	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソ トープセンター

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金 (円:税込)	管理部門
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	フラックス測定（プロトン）：照射中のフラックスをSEMでモニター	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	ビームプロファイル測定：GAFCHROMICフィルムによるビームプロファイル測定	17,850 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更 (8:00～18:00)	26,880 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更 (5:00～8:00、18:00～22:00)	30,975 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更 (22:00～翌5:00)	35,070 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	中性子エネルギースペクトル測定：液体シンチレーターによる中性子エネルギースペクトル測定	25,200 円/ 1回	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	中性子フラックス測定：ビームカレントをモニターし、1秒あたりのフラックスデータを提供	3,412 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	深夜・休日対応：土日、休日、深夜の対応（測定準備、トラブル対応等）	6,300 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-2	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	本人利用	62,208 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
103-2	高速イオン・中性子ビーム照射装置	最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	本人利用	80,612 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
104	粒子加速装置(医用小型サイクロトロン)	住友重機械工業 CYPRIS-HM12	学内	本人利用	62,812 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
104	粒子加速装置(医用小型サイクロトロン)	住友重機械工業 CYPRIS-HM12	学外	本人利用	63,059 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
107	小動物用PET・CT装置	島津製作所ClairvivoPET・CT	学内	本人利用	7,533 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
107	小動物用PET・CT装置	島津製作所ClairvivoPET・CT	学外	本人利用	14,371 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
205	全身用PETシステム	(株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)	学内	本人利用	26,496 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
205	全身用PETシステム	(株)島津製作所製 Eminence-B(SET-3000B/X)	学外	本人利用	40,885 円/ 時間	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
706	液体シンチレーションシステム	LSC-7400	学外	本人利用	47,346 円/ 日	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
020	イメージング質量顕微鏡	島津製作所 iMScope	学内	本人利用	72 円/ 時間	医学系研究科
020	イメージング質量顕微鏡	島津製作所 iMScope	学内	委託利用	72 円/ 時間	医学系研究科
214	ラボラトリーオートメーションシステム	ベックマンコールター BiomekFXP	学内	本人利用	1,283 円/ 時間	医学系研究科
220	ナノリッター分注システムMosquitoHTSシステム2Way	TTP Labtech Mosquito HTS	学内	本人利用	17 円/ 時間	医学系研究科
045	励起用フェムト秒レーザー発生装置	ニコン 超短パルスレーザー分子イメージングシステム MaiTai DS-NT70	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
045	励起用フェムト秒レーザー発生装置	ニコン 超短パルスレーザー分子イメージングシステム MaiTai DS-NT70	学外	本人利用	3,263 円/ 時間	医工学研究科
046	波長可変パラメトリック増幅器分光イメージングシステム	プレスト 超短パルスレーザー分子イメージングシステム	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
046	波長可変パラメトリック増幅器分光イメージングシステム	プレスト 超短パルスレーザー分子イメージングシステム	学外	本人利用	6,813 円/ 時間	医工学研究科
173	超精密生体分子分析装置		学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
173	超精密生体分子分析装置		学外	本人利用	2,294 円/ 時間	医工学研究科
174	生体機能画像解析装置	Leica Microsystems	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
174	生体機能画像解析装置	Leica Microsystems	学外	本人利用	2,179 円/ 時間	医工学研究科
175	生体適合デバイス特性測定装置	セラバス128chシステム	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
175	生体適合デバイス特性測定装置	セラバス128chシステム	学外	本人利用	2,623 円/ 時間	医工学研究科
176	硬組織三次元形態解析装置		学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
176	硬組織三次元形態解析装置		学外	本人利用	3,880 円/ 時間	医工学研究科
177	多波長画像解析装置	フリーシステムズ SC4000-YMR	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
177	多波長画像解析装置	フリーシステムズ SC4000-YMR	学外	本人利用	2,235 円/ 時間	医工学研究科
178	ナノイメージング解析装置		学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
178	ナノイメージング解析装置		学外	本人利用	3,836 円/ 時間	医工学研究科
179	生体モデル分析装置		学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
179	生体モデル分析装置		学外	本人利用	1,830 円/ 時間	医工学研究科
180	神経細胞活動記録解析装置		学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
180	神経細胞活動記録解析装置		学外	本人利用	1,840 円/ 時間	医工学研究科
181	生体電気現象解析処理装置	ソーラトロン	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
181	生体電気現象解析処理装置	ソーラトロン	学外	本人利用	2,053 円/ 時間	医工学研究科
182	多機能生理学実習装置	BIOPAC Systems	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
182	多機能生理学実習装置	BIOPAC Systems	学外	本人利用	2,142 円/ 時間	医工学研究科
183	マウス・ラット自動飼育装置システム	KIS-160WTU	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
183	マウス・ラット自動飼育装置システム	KIS-160WTU	学外	本人利用	2,190 円/ 時間	医工学研究科

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金（円：税込）	管理部門
184	高解像度超音波画像解析装置	TKSHD-10CH101	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
184	高解像度超音波画像解析装置	TKSHD-10CH101	学外	本人利用	2,662 円/ 時間	医工学研究科
188	顕微鏡デジタルカメラ	オリンパス	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
188	顕微鏡デジタルカメラ	オリンパス	学外	本人利用	1,855 円/ 時間	医工学研究科
189	小動物隔離収容装置	CR-1600THSS	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
189	小動物隔離収容装置	CR-1600THSS	学外	本人利用	2,122 円/ 時間	医工学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学内	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム（ニコン A1RMP-MR）と併せて使用時(学内)	1,914 円/ 1時間	医工学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学内	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム（ニコン A1RMP-MR）と併せて使用時(学外)	5,810 円/ 1時間	医工学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学外	本人利用	6,059 円/ 時間	医工学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学外	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム（ニコン A1RMP-MR）と併せて使用時(学内)	1,914 円/ 1時間	医工学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems TCS SP8 STED	学外	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム（ニコン A1RMP-MR）と併せて使用時(学外)	5,810 円/ 1時間	医工学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR（ニコン）	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR（ニコン）	学内	超解像レーザー顕微鏡（ライカ TCS SP8 STED）と併せて使用時(学内)	1,914 円/ 1時間	医工学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR（ニコン）	学内	超解像レーザー顕微鏡（ライカ TCS SP8 STED）と併せて使用時(学外)	5,810 円/ 1時間	医工学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR（ニコン）	学外	本人利用	2,879 円/ 時間	医工学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR（ニコン）	学外	超解像レーザー顕微鏡（ライカ TCS SP8 STED）と併せて使用時(学内)	1,914 円/ 1時間	医工学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	A1RMP-MR（ニコン）	学外	超解像レーザー顕微鏡（ライカ TCS SP8 STED）と併せて使用時(学外)	5,810 円/ 1時間	医工学研究科
285	小動物用磁気共鳴イメージングシステム	Bruker BioSpin ICON 1T	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
285	小動物用磁気共鳴イメージングシステム	Bruker BioSpin ICON 1T	学外	本人利用	7,015 円/ 時間	医工学研究科
286	立位全身核磁気共鳴イメージング解析装置	(伊) ESAOTE社製 G-scan brio	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
286	立位全身核磁気共鳴イメージング解析装置	(伊) ESAOTE社製 G-scan brio	学外	本人利用	6,560 円/ 時間	医工学研究科
288	三次元動作分析装置 本体	アニマ(株)製 MA-8000	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
288	三次元動作分析装置 本体	アニマ(株)製 MA-8000	学外	本人利用	3,500 円/ 時間	医工学研究科
289	ニューロモジュレーションシステム	Magstim TYPE2; RogueResearch Brainsight2	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
289	ニューロモジュレーションシステム	Magstim TYPE2; RogueResearch Brainsight2	学外	本人利用	2,933 円/ 時間	医工学研究科
290	高精度エネルギー代謝測定システム	(有)アルコシステム製 ARCO-2000	学内	本人利用	1,758 円/ 時間	医工学研究科
290	高精度エネルギー代謝測定システム	(有)アルコシステム製 ARCO-2000	学外	本人利用	2,507 円/ 時間	医工学研究科
657	赤外イメージングシステム	(米) サーモフィッシャーサイエンティフィック社製 Nicolet iN10 MX-1	学内	本人利用	7,045 円/ 時間	学際科学フロンティア研究所
728	707型超遠心機	(米)ベックマンコルター社製 Optima XE-90	学内	本人利用	1,680 円/ 時間	学際科学フロンティア研究所
008	高分解能CTスキャンシステム	コムスキャンテクノ 高精細小型標本用装置 ScanXmate-D160TSS105/11000 外	部局内	本人利用	12,048 円/ 時間	学術資源研究公開センター
008	高分解能CTスキャンシステム	コムスキャンテクノ 高精細小型標本用装置 ScanXmate-D160TSS105/11000 外	学内	本人利用	12,048 円/ 時間	学術資源研究公開センター
008	高分解能CTスキャンシステム	コムスキャンテクノ 高精細小型標本用装置 ScanXmate-D160TSS105/11000 外	学外	本人利用	21,838 円/ 時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子(株)製 JCM-7000(EDS、ステージナビゲーションシステム含む)	部局内	本人利用	831 円/ 時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子(株)製 JCM-7000(EDS、ステージナビゲーションシステム含む)	学内	本人利用	831 円/ 時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子(株)製 JCM-7000(EDS、ステージナビゲーションシステム含む)	学外	本人利用	1,388 円/ 時間	学術資源研究公開センター
294	分析走査電子顕微鏡	日本電子(株)製 JSM-6610A(OIM結晶方位解析装置含む)	学内	本人利用	127 円/ 時間	金属材料研究所
294	分析走査電子顕微鏡	日本電子(株)製 JSM-6610A(OIM結晶方位解析装置含む)	学外	本人利用	5,351 円/ 時間	金属材料研究所
526	分析走査電子顕微鏡	日本電子(株)製JSM-IT200(A)	学内	本人利用	1,397 円/ 時間	金属材料研究所
526	分析走査電子顕微鏡	日本電子(株)製JSM-IT200(A)	学外	本人利用	2,808 円/ 時間	金属材料研究所
544	赤外線加熱合成炉	クリスタルシステム FZ-4-10K-K-M	学内	本人利用	857 円/ 時間	金属材料研究所
544	赤外線加熱合成炉	クリスタルシステム FZ-4-10K-K-M	学外	本人利用	1,072 円/ 時間	金属材料研究所
545	赤外線加熱単結晶育成装置	キャノンマシナリー SC-K15HD	学内	本人利用	739 円/ 時間	金属材料研究所
545	赤外線加熱単結晶育成装置	キャノンマシナリー SC-K15HD	学外	本人利用	1,794 円/ 時間	金属材料研究所
546	赤外線加熱単結晶育成装置（整備品）	キャノンマシナリー SC II -EDH-KS	学内	本人利用	739 円/ 時間	金属材料研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金（円：税込）	管理部門
546	赤外線加熱単結晶育成装置（整備品）	キャノンマシンリー SC II -EDH-KS	学外	本人利用	1,601 円/ 時間	金属材料研究所
547	分析走査電子顕微鏡	日本電子(株)製 JSM-6010PLUS/LA	学内	本人利用	207 円/ 時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学内	本人利用	488 円/ 時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学内	低温X線粉末構造解析用冷凍機	87 円/ 時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学外	本人利用	1,691 円/ 時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク RINT-2500LAUE	学外	低温X線粉末構造解析用冷凍機	2,378 円/ 時間	金属材料研究所
616	単結晶試料方位確認装置(ラウエ)	マックスサイエンス M03XHF-E	学内	本人利用	189 円/ 時間	金属材料研究所
616	単結晶試料方位確認装置(ラウエ)	マックスサイエンス M03XHF-E	学外	本人利用	190 円/ 時間	金属材料研究所
637	熱拡散測定装置	Netzsch・LFA467	学内	本人利用	2,425 円/ 時間	金属材料研究所
637	熱拡散測定装置	Netzsch・LFA467	学外	本人利用	6,468 円/ 時間	金属材料研究所
638	ナノインデント	東陽テクニカ・G200	学内	本人利用	2,194 円/ 時間	金属材料研究所
638	ナノインデント	東陽テクニカ・G200	学外	本人利用	8,547 円/ 時間	金属材料研究所
639	集束イオンビーム加工観察装置	日立ハイテック・FB2100	学内	本人利用	6,083 円/ 時間	金属材料研究所
639	集束イオンビーム加工観察装置	日立ハイテック・FB2100	学外	本人利用	8,834 円/ 時間	金属材料研究所
695	三次元アトムプローブ測定データ用解析ワークステーション	デル・テクノロジーズ(株)ワークステーション Precision 7920 タワー XCTO ベース	学内	本人利用	11,280 円/ 日	金属材料研究所
695	三次元アトムプローブ測定データ用解析ワークステーション	デル・テクノロジーズ(株)ワークステーション Precision 7920 タワー XCTO ベース	学内	技術指導料：解析ソフト使用法の指導	9,240 円/ 回	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学内	本人利用	1,753 円/ 日	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学内	委託利用	16,848 円/ 日	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学外	本人利用	3,157 円/ 日	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	ブラザー工業HS300	学外	委託利用	18,252 円/ 日	金属材料研究所
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	部局内	委託利用	6,889 円/ 時間	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	本人利用	3,536 円/ 時間	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	委託利用	6,889 円/ 時間	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学内	バイアル（蓋付）	127 円/ 個	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	本人利用	5,472 円/ 時間	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	委託利用	30,048 円/ 時間	工学研究科
655	イオンクロマトグラフ分析装置	(米)Thermo Fisher Scientific社 Integriion	学外	バイアル（蓋付）	127 円/ 個	工学研究科
255	デジタル電動サーボプレス	(株)アマダ製 SDE2025SF	学内	本人利用	6,930 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
255	デジタル電動サーボプレス	(株)アマダ製 SDE2025SF	学外	本人利用	7,298 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL600G	学外	本人利用	46,169 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL600G	学外	委託利用	46,169 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
733	400MHz NMR(溶液・固体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL400G	学外	本人利用	27,519 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
733	400MHz NMR(溶液・固体兼用)	日本電子(株)製 JNM-ECZL400G	学外	委託利用	27,519 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子(株)製 JNM-ECZ300R	学外	本人利用	34,788 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子(株)製 JNM-ECZ300R	学外	委託利用	34,788 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
756	遠隔操作対応走査電子顕微鏡システム	日本電子(株)製 JSM-IT800(SHL)	学内	本人利用	3,213 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
756	遠隔操作対応走査電子顕微鏡システム	日本電子(株)製 JSM-IT800(SHL)	学外	本人利用	13,839 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
757	精密イオンリソングシステム	(米)Gatan社製 PIPS II cool 695.C	学内	本人利用	4,293 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
757	精密イオンリソングシステム	(米)Gatan社製 PIPS II cool 695.C	学外	本人利用	13,644 円/ 時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
275	多機能薄膜X線回折装置 D8DISCOVER-TM 一式	(独)ブルカー・イククス社製 D8DISCOVER-TM	学内	本人利用	0 円/ 時間	工学研究科（化学・バイオ系）
745	タンパク質精製クロマトグラフィー	(米)バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社製NGC F100	学外	本人利用	6,242 円/ 日	工学研究科（化学・バイオ系）
746	バイオシェーカー	タイトック(株)製バイオシェーカー G・BR200	学外	本人利用	4,268 円/ 日	工学研究科（化学・バイオ系）
265	硬度計IBISナノインデント	(豪)Fischer-CrippsLaboratories社製	学内	本人利用	1,149 円/ 時間	工学研究科（機械・知能系）
354	高温高圧腐食試験装置 一式	東伸工業(株)製 SERT-MINI-30PB	学内	本人利用	2,022 円/ 時間	工学研究科（機械・知能系）
354	高温高圧腐食試験装置 一式	東伸工業(株)製 SERT-MINI-30PB	学内	ガスケット	10,395 円/ 1回	工学研究科（機械・知能系）
354	高温高圧腐食試験装置 一式	東伸工業(株)製 SERT-MINI-30PB	学外	ガスケット	10,395 円/ 1回	工学研究科（機械・知能系）
539	ウエハ接合装置	ズースマイクロテック SB-6e	学内	本人利用	4,620 円/ 時間	工学研究科（機械・知能系）
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学内	本人利用	28,875 円/ 日	工学研究科（機械・知能系）
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学内	技術指導料（技術職員）：技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802 円/ 時間	工学研究科（機械・知能系）
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学内	技術指導料（教員）：教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850 円/ 時間	工学研究科（機械・知能系）
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学外	本人利用	85,194 円/ 日	工学研究科（機械・知能系）

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金 (円:税込)	管理部署
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学外	技術指導料 (技術職員):技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802 円/ 時間	工学研究科 (機械・知能系)
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics社 RPEA-4.5型	学外	技術指導料 (教員):教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850 円/ 時間	工学研究科 (機械・知能系)
701	タンデムペレトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学内	本人利用	28,875 円/ 日	工学研究科 (機械・知能系)
701	タンデムペレトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学内	技術指導料 (技術職員):技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802 円/ 時間	工学研究科 (機械・知能系)
701	タンデムペレトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学内	技術指導料 (教員):教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850 円/ 時間	工学研究科 (機械・知能系)
701	タンデムペレトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学外	本人利用	59,108 円/ 日	工学研究科 (機械・知能系)
701	タンデムペレトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学外	技術指導料 (技術職員):技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802 円/ 時間	工学研究科 (機械・知能系)
701	タンデムペレトロン加速器	(米)National Electronics Corporation製、3SDH-2	学外	技術指導料 (教員):教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850 円/ 時間	工学研究科 (機械・知能系)
709	超臨界水中酸化試験装置	P-0068,(株)高科技研工業	学内	本人利用	2,584 円/ 時間	工学研究科 (機械・知能系)
709	超臨界水中酸化試験装置	P-0068,(株)高科技研工業	学内	技術指導料	4,901 円/ 時間	工学研究科 (機械・知能系)
709	超臨界水中酸化試験装置	P-0068,(株)高科技研工業	学内	パッキン	90,090 円/ 1回使用あたり	工学研究科 (機械・知能系)
709	超臨界水中酸化試験装置	P-0068,(株)高科技研工業	学外	本人利用	3,936 円/ 時間	工学研究科 (機械・知能系)
709	超臨界水中酸化試験装置	P-0068,(株)高科技研工業	学外	技術指導料	4,901 円/ 時間	工学研究科 (機械・知能系)
709	超臨界水中酸化試験装置	P-0068,(株)高科技研工業	学外	パッキン	90,090 円/ 1回使用あたり	工学研究科 (機械・知能系)
196	実変動風荷重装置		学内	本人利用	32,819 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
196	実変動風荷重装置		学外	本人利用	43,968 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
238	10MN大型構造物性能評価システム	(株)島津製作所製 UH-C10MNX	学内	本人利用	47,355 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
238	10MN大型構造物性能評価システム	(株)島津製作所製 UH-C10MNX	学外	本人利用	131,839 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学内	本人利用	2,816 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学内	委託利用	2,816 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学内	技術指導料	11,550 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学内	コンプレッソメーター (φ50)	140 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学内	コンプレッソメーター (φ100)	119 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学内	動ひずみ計	143 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学内	計測ソフトウェア	78 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学外	本人利用	5,420 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学外	委託利用	5,420 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学外	技術指導料	11,550 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学外	コンプレッソメーター (φ50)	308 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学外	コンプレッソメーター (φ100)	262 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学外	動ひずみ計	316 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
266	1000kN油圧万能試験機	(株)東京試験機製 YU-1000SIV	学外	計測ソフトウェア	163 円/ 時間	工学研究科 (人間・環境系)
269	1000kN万能試験機	(株)前川試験機製作所製MRA-100-F2	学内	本人利用	20,790 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
269	1000kN万能試験機	(株)前川試験機製作所製MRA-100-F2	学外	本人利用	29,141 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
273	2000kN圧縮試験機	(株)前川試験機製作所製 ACA-200A-F1	学内	本人利用	20,790 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
273	2000kN圧縮試験機	(株)前川試験機製作所製 ACA-200A-F1	学外	本人利用	26,835 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業株式会社	学内	本人利用	33,388 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業株式会社	学内	委託利用	33,388 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業株式会社	学内	技術指導料: 載荷システム (振動台) の稼働に伴う運転	173,250 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業株式会社	学内	計測補助: 計測器等の設置補助 (1人)	9,009 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業株式会社	学内	大型重量試験対象物等の保管	27,286 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業株式会社	学外	本人利用	218,188 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業株式会社	学外	委託利用	218,188 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業株式会社	学外	技術指導料: 載荷システム (振動台) の稼働に伴う運転	173,250 円/ 日	工学研究科 (人間・環境系)

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金 (円:税込)	管理部署
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学外	計測補助:計測器等の設置補助(1人)	9,009 円/日	工学研究科(人間・環境系)
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工株式会社	学外	大型重量試験対象物等の保管	27,286 円/日	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	本人利用	2,907 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	委託利用	2,907 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	技術指導料	11,550 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	動ひずみ計	143 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学内	計測ソフトウェア	78 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	本人利用	3,767 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	委託利用	3,767 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	技術指導料	11,550 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	動ひずみ計	316 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
711	30kN万能材料試験機	インストロン 5900R	学外	計測ソフトウェア	163 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	本人利用	4,035 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	委託利用	4,035 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	技術指導料	3,465 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	動ひずみ計	143 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学内	計測ソフトウェア	78 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	本人利用	4,118 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	委託利用	4,118 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	技術指導料	3,465 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	動ひずみ計	316 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所	学外	計測ソフトウェア	163 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
758	誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)	Agilent ICP-MS8800	学内	本人利用	10,972 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
758	誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)	Agilent ICP-MS8800	学外	本人利用	16,483 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	部局内	委託利用	18,980 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	部局内	ラボ用オートクレーブ	4,167 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	学内	委託利用	18,980 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	学内	分解前処理	300 円/処理数	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	学外	委託利用	63,328 円/時間	工学研究科(人間・環境系)
776	窒素・りん分析装置	QuAAtro39	学外	分解前処理	300 円/処理数	工学研究科(人間・環境系)
381	超伝導量子干渉型振動試料磁力計 1式	(米)カンム・デザイン社製, MPMS3	学内	本人利用	15,026 円/日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
381	超伝導量子干渉型振動試料磁力計 1式	(米)カンム・デザイン社製, MPMS3	学外	本人利用	43,141 円/日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
382	高温度領域粉末微小磁化測定装置	(米)カンム・デザイン社製, MPMS-XL	学内	本人利用	35,380 円/日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
382	高温度領域粉末微小磁化測定装置	(米)カンム・デザイン社製, MPMS-XL	学外	本人利用	52,674 円/日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
383	物理特性測定システム	(米)カンム・デザイン社製, PPMS	学内	本人利用	16,920 円/日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
383	物理特性測定システム	(米)カンム・デザイン社製, PPMS	学外	本人利用	34,100 円/日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
384	Helios600i FIB/SEMデュアルモードシステム	(米)FEI社製 FEI Helios600i	学内	本人利用	3,227 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
384	Helios600i FIB/SEMデュアルモードシステム	(米)FEI社製 FEI Helios600i	学外	本人利用	76,378 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
385	AFM	(株)アイトラムテクノロジー製	学内	本人利用	1,315 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
385	AFM	(株)アイトラムテクノロジー製	学外	本人利用	6,384 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
386	インプレーンX線回折装置 ATX/in-plane	(株)リガク製 ATX/in-plane	学内	本人利用	2,808 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
386	インプレーンX線回折装置 ATX/in-plane	(株)リガク製 ATX/in-plane	学外	本人利用	3,154 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
397	振動試料型磁力計 BHV-50HM	理研電子(株) BHV-50HM	学内	本人利用	2,259 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
397	振動試料型磁力計 BHV-50HM	理研電子(株) BHV-50HM	学外	本人利用	3,754 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
398	振動試料型磁力計 VSM-P7	東英工業(株) VSM-P7	学内	本人利用	2,129 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
398	振動試料型磁力計 VSM-P7	東英工業(株) VSM-P7	学外	本人利用	25,595 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
399	磁気異方性トルク TM-TR2050-HGC-MG	(株)玉川製作所 TM-TR2050-HGC-MG	学内	本人利用	9,170 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
399	磁気異方性トルク TM-TR2050-HGC-MG	(株)玉川製作所 TM-TR2050-HGC-MG	学外	本人利用	11,920 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
400	バルク試料用磁気異方性トルク磁力計	自作	学内	本人利用	2,129 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
400	バルク試料用磁気異方性トルク磁力計	自作	学外	本人利用	6,407 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
401	電子スピン共鳴測定システム E-500	自作	学内	本人利用	5,952 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
401	電子スピン共鳴測定システム E-500	自作	学外	本人利用	14,807 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
402	インラインスパッタリング装置 C3010	自作	学内	本人利用	6,544 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
402	インラインスパッタリング装置 C3010	自作	学外	本人利用	8,498 円/時間	工学研究科(電子情報システム・応物系)
406	超高周波透磁率測定装置	凌和電子(株)製 PMM-9G1	学内	本人利用	3,465 円/日	工学研究科(電子情報システム・応物系)

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金(円:税込)	管理部署
406	超高周波透磁率測定装置	凌和電子(株)製 PMM-9G1	学外	本人利用	39,516 円/ 日	工学研究科(電子情報システム・応物系)
130	透過型電子顕微鏡 (FE-TEM)	日本電子 JEM-2100F	学内	本人利用	1,155 円/ 時間	工学研究科(本部)
130	透過型電子顕微鏡 (FE-TEM)	日本電子 JEM-2100F	学外	本人利用	10,779 円/ 時間	工学研究科(本部)
131	走査型電子顕微鏡・結晶方位解析 (FE-SEM/EBSD)	日本電子 JSM-7100F	学内	本人利用	924 円/ 時間	工学研究科(本部)
131	走査型電子顕微鏡・結晶方位解析 (FE-SEM/EBSD)	日本電子 JSM-7100F	学外	本人利用	6,436 円/ 時間	工学研究科(本部)
268	走査型プローブ顕微鏡システム	エスアイアイ・ナノテクノロジー社製 NanoNaviReal	学内	本人利用	924 円/ 時間	工学研究科(本部)
268	走査型プローブ顕微鏡システム	エスアイアイ・ナノテクノロジー社製 NanoNaviReal	学外	本人利用	4,487 円/ 時間	工学研究科(本部)
702	電顕用イオンミリング加工装置	日本電子(株)製、GATAN PIPS691	学内	本人利用	977 円/ 時間	工学研究科(本部)
702	電顕用イオンミリング加工装置	日本電子(株)製、GATAN PIPS691	学外	本人利用	2,748 円/ 時間	工学研究科(本部)
740	ハイスピードカメラ	(米) VisionResearch社製Phantom VRI-TMX6410-128G-MTH2	学内	本人利用	2,697 円/ 時間	国際放射光イノベーション・スマート研究センター
740	ハイスピードカメラ	(米) VisionResearch社製Phantom VRI-TMX6410-128G-MTH2	学外	本人利用	5,234 円/ 時間	国際放射光イノベーション・スマート研究センター
200	真空凍結乾燥システム	TF20-80TNN	学内	本人利用	163 円/ 時間	災害科学国際研究所
200	真空凍結乾燥システム	TF20-80TNN	学外	本人利用	1,102 円/ 時間	災害科学国際研究所
315	災害関連疾病病態マックス解析システム		学内	本人利用	579 円/ 時間	災害科学国際研究所
315	災害関連疾病病態マックス解析システム		学外	本人利用	10,920 円/ 時間	災害科学国際研究所
316	データ長期保存システム		学内	本人利用	27,057 円/ 時間	災害科学国際研究所
316	データ長期保存システム		学外	本人利用	27,584 円/ 時間	災害科学国際研究所
317	高精度・低消費電力地震波観測装置 一式		学内	本人利用	1 円/ 時間	災害科学国際研究所
317	高精度・低消費電力地震波観測装置 一式		学外	本人利用	263 円/ 時間	災害科学国際研究所
318	細胞特異的災害ストレス解析システム	全自動磁気細胞分離システム,全自動核酸・タンパク質抽出システム	学内	本人利用	820 円/ 時間	災害科学国際研究所
318	細胞特異的災害ストレス解析システム	全自動磁気細胞分離システム,全自動核酸・タンパク質抽出システム	学外	本人利用	10,302 円/ 時間	災害科学国際研究所
319	複合現実空間災害情報表示設備 一式	MRヘッドマウントディスプレイ MREAL HM-A1	学内	本人利用	2,311 円/ 時間	災害科学国際研究所
319	複合現実空間災害情報表示設備 一式	MRヘッドマウントディスプレイ MREAL HM-A1	学外	本人利用	4,356 円/ 時間	災害科学国際研究所
320	防災・減災情報表示設備 一式		学内	本人利用	1,213 円/ 時間	災害科学国際研究所
356	災害解析用計算機システム 一式		学内	本人利用	9,967 円/ 日	災害科学国際研究所
356	災害解析用計算機システム 一式		学外	本人利用	24,931 円/ 日	災害科学国際研究所
357	災害記録収集設備		学内	本人利用	0 円/ 時間	災害科学国際研究所
532	Sabia Art Scanner LiAM S	(株)サビア製	学内	本人利用	11,550 円/ 日	災害科学国際研究所
532	Sabia Art Scanner LiAM S	(株)サビア製	学外	本人利用	89,801 円/ 日	災害科学国際研究所
225	疲労試験機 (ElectroPuls E10000)	Instron ElectroPuls E10000	学内	本人利用	175 円/ 時間	歯学研究科
226	マイクロフォーカスX線CT装置 (ScanXmate-E090)	コムスキャンテクノ ScanXmate-E090	学内	本人利用	1,106 円/ 時間	歯学研究科
227	レーザーマイクロダイセクションユニット (LMD7000)	Leica Microsystems LMD7000	学内	本人利用	995 円/ 時間	歯学研究科
227	レーザーマイクロダイセクションユニット (LMD7000)	Leica Microsystems LMD7000	学外	本人利用	5,486 円/ 時間	歯学研究科
536	走査電子顕微鏡 (JSM-6390LA)	日本電子 JSM-6390LA	学内	本人利用	1,975 円/ 時間	歯学研究科
537	ゼーゲミクロトーム (SP1600)	Leica SP1600	学内	本人利用	425 円/ 時間	歯学研究科
538	クライオスタット (CM3050S)	ライカ CM3050S	学内	本人利用	800 円/ 時間	歯学研究科
039	レーザーマイクロダイセクション	Thermo Fisher Scientific ArcturusXTTM	学内	本人利用	3,795 円/ 時間	生命科学研究科
039	レーザーマイクロダイセクション	Thermo Fisher Scientific ArcturusXTTM	学内	マイクロポイント	544 円/ 時間	生命科学研究科
039	レーザーマイクロダイセクション	Thermo Fisher Scientific ArcturusXTTM	学外	本人利用	5,101 円/ 時間	生命科学研究科
039	レーザーマイクロダイセクション	Thermo Fisher Scientific ArcturusXTTM	学外	マイクロポイント	949 円/ 時間	生命科学研究科
040	マイクロウェーブプロセッサ	Energy Beam Science H2850	学内	本人利用	787 円/ 時間	生命科学研究科
040	マイクロウェーブプロセッサ	Energy Beam Science H2850	学外	本人利用	887 円/ 時間	生命科学研究科
041	飛行時間型質量分析装置	AB SCIEX 5800 MALDI TOF/TOFTM	学内	本人利用	11,025 円/ 時間	生命科学研究科
041	飛行時間型質量分析装置	AB SCIEX 5800 MALDI TOF/TOFTM	学外	本人利用	13,843 円/ 時間	生命科学研究科
042	生体低分子測定装置 組織プロテオーム解析装置	Triple TOF5600(AB SCIEX)外	学内	委託利用	52,500 円/ サンプル	生命科学研究科
043	生体分子間相互作用解析装置 (Biacore T200 外)	GE Healthcare Life Sciences Biacore T200 外	学内	本人利用	1,794 円/ 時間	生命科学研究科
043	生体分子間相互作用解析装置 (Biacore T200 外)	GE Healthcare Life Sciences Biacore T200 外	学外	本人利用	3,733 円/ 時間	生命科学研究科
090	共焦点レーザースキャン顕微鏡	Carl-Zeiss LSM 710	学内	本人利用	1,446 円/ 時間	生命科学研究科
090	共焦点レーザースキャン顕微鏡	Carl-Zeiss LSM 710	学外	本人利用	2,385 円/ 時間	生命科学研究科
636	飛行時間型質量分析計	Bruker micrOTOF II	学内	本人利用	538 円/ 1 サンプル	生命科学研究科
658	生体高分子専用 透過型電子顕微鏡	日本電子 JEM-1400plus	学内	本人利用	2,310 円/ 時間	生命科学研究科
658	生体高分子専用 透過型電子顕微鏡	日本電子 JEM-1400plus	学内	講習料: 操作指導(利用前トレーニング)	1回12時間 83,160 円/ (4時間×3日間)	生命科学研究科
658	生体高分子専用 透過型電子顕微鏡	日本電子 JEM-1400plus	学内	講習料: 操作指導(復習用トレーニング)	1回4時間 (4時間×1日間)	生命科学研究科
742	PDS-1000/He Heptaシステム	バイオラッドラボラトリーズ	学内	本人利用	3,990 円/ 1 shot	生命科学研究科
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss, Xradia 800 Ultra	学内	本人利用	11,437 円/ 日	多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss, Xradia 800 Ultra	学内	委託利用	48,429 円/ 日	多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss, Xradia 800 Ultra	学外	本人利用	75,833 円/ 日	多元物質科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金（円：税込）	管理部門
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss、Xradia 800 Ultra	学外	委託利用	112,823 円/ 日	多元物質科学研究所
171	無響室	日本音響エンジニアリング	学内	本人利用	1,256 円/ 時間	電気通信研究所
171	無響室	日本音響エンジニアリング	学外	本人利用	7,369 円/ 時間	電気通信研究所
172	防音シールド室	日本音響エンジニアリング	学内	本人利用	790 円/ 時間	電気通信研究所
172	防音シールド室	日本音響エンジニアリング	学外	本人利用	5,708 円/ 時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学内	本人利用	684 円/ 時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学内	技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学外	本人利用	1,194 円/ 時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置		学外	技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学内	本人利用	627 円/ 時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学内	技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学外	本人利用	1,172 円/ 時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置		学外	技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
774	半導体ホール測定装置	理工貿易株式会社	学内	本人利用	1,730 円/ 時間	電気通信研究所
322	LECO社製 炭素硫黄分析装置 CS844MC型	LECO CS844MC	学内	本人利用	36,475 円/ 日	東北アジア研究センター
322	LECO社製 炭素硫黄分析装置 CS844MC型	LECO CS844MC	学外	本人利用	41,288 円/ 日	東北アジア研究センター
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	本人利用	3,551 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	委託利用	8,650 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	講習：利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	技術指導料：利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学外	本人利用	3,551 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学外	委託利用	8,650 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学外	講習：利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学外	技術指導料：利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVAVCE600	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学内	本人利用	2,962 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学内	委託利用	7,928 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学内	講習：利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学内	技術指導料：利用前の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学外	本人利用	4,347 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学外	委託利用	9,313 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学外	講習：利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学外	技術指導料：利用前の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin マルチシステム用800MHz	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学内	本人利用	2,826 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学内	委託利用	7,926 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学内	講習：利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学内	技術指導料：利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	本人利用	2,975 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	委託利用	8,075 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	講習：利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	技術指導料：利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin 自己遮蔽型AVANCE600	学外	SAMPLE JETサブジェン	229 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学内	本人利用	2,483 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金（円：税込）	管理部署
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学内	委託利用	7,969 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学内	講習：利用前の操作練習	13,513 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学内	技術指導料：利用中の操作指導	4,504 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学外	本人利用	4,131 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学外	委託利用	9,618 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学外	講習：利用前の操作練習	13,513 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学外	技術指導料：利用中の操作指導	4,504 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Orbitrap Fusion	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	本人利用	2,194 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	委託利用	7,680 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	講習：利用前の操作練習	13,513 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	技術指導料：利用中の操作指導	4,504 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	本人利用	2,853 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	委託利用	8,340 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	講習：利用前の操作練習	13,513 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	技術指導料：利用中の操作指導	4,504 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
374	四重極-フーリエ変換質量分析装置①	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	本人利用	2,194 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	委託利用	7,680 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	講習：利用前の操作練習	13,513 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	技術指導料：利用中の操作指導	4,504 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	本人利用	2,853 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	委託利用	8,340 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	講習：利用前の操作練習	13,513 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	技術指導料：利用中の操作指導	4,504 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
375	四重極-フーリエ変換質量分析装置②	(米) Thermo Fisher Scientific 社製 Qexactive	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学内	委託利用	258 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学内	消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋）	207 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学内	作業費（運転技術職員人件費）	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学外	委託利用	472 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学外	消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋）	207 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	イルミナ社製MiSeq	学外	作業費（運転技術職員人件費）	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学内	委託利用	34 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学内	消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋）	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学内	作業費（運転技術職員人件費）	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学外	委託利用	1,176 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学外	消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋）	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
379	次世代シーケンサーHiSeq2500-A	イルミナ社製HiSeq2500	学外	作業費（運転技術職員人件費）	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
380	次世代シーケンサーHiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学内	委託利用	34 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金（円：税込）	管理部署
380	次世代シーケンサー-HiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学内	消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋）	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
380	次世代シーケンサー-HiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学内	作業費（運転技術職員人件費）	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
380	次世代シーケンサー-HiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学外	委託利用	1,176 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
380	次世代シーケンサー-HiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学外	消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋）	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
380	次世代シーケンサー-HiSeq2500-B	イルミナ社製HiSeq2500	学外	作業費（運転技術職員人件費）	3,003 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	本人利用	2,772 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	委託利用	7,507 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	講習：利用前の操作練習	10,395 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	技術指導料：利用中の操作指導	1,732 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	本人利用	3,071 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	委託利用	7,749 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	講習：利用前の操作練習	10,395 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	技術指導料：利用中の操作指導	1,732 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
534	トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計GCMS-TQ8040	株式会社島津製作所	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学内	本人利用	1,501 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学内	委託利用	6,987 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学内	講習：利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学内	技術指導料：利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学外	本人利用	1,661 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学外	委託利用	7,147 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学外	講習：利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学外	技術指導料：利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
535	タンデム四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製XEVOTQ-S	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
556	マイクロアレイスキャナーシステム	イルミナ社製iScan	学内	本人利用	1,260 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
556	マイクロアレイスキャナーシステム	イルミナ社製iScan	学内	技術指導料：解析機器使用等に係る指導	499 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサーDNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学内	委託利用	1,656 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサーDNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学内	消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋）	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサーDNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学内	作業費（運転技術職員人件費）	6,006 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサーDNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学外	消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋）	196 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサーDNBSEQ-T7-#3	MGI社 DNBSEQ-T7	学外	作業費（運転技術職員人件費）	6,006 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学内	本人利用	1,501 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学内	委託利用	6,987 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学内	講習：利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学内	技術指導料：利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学内	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	本人利用	1,972 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	委託利用	7,459 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	講習：利用前の操作練習	11,434 円/ 回	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	技術指導料：利用中の操作指導	3,811 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量型 μ 四重極型質量分析装置	(米)ウォータース社製 XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	施設等使用料	404 円/ 時間	東北メディカル・メガバンク機構
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型	学内	本人利用	3,305 円/ 時間	農学研究科

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金 (円:税込)	管理部署
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent (Varian) 600MHz,NMR 600TT型	学外	本人利用	4,359 円/ 時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム (燃烧型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃烧型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	7,385 円/ 時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム (燃烧型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃烧型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	7,385 円/ 時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム (燃烧型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃烧型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	7,925 円/ 時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム (燃烧型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃烧型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	7,925 円/ 時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム (熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	37,104 円/ 時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム (熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	37,104 円/ 時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム (熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	37,617 円/ 時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム (熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	37,617 円/ 時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム (ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	41,587 円/ 時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム (ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	41,587 円/ 時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム (ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	42,258 円/ 時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム (ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	42,258 円/ 時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム (試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	本人利用	19,923 円/ 時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム (試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学内	委託利用	19,923 円/ 時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム (試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	本人利用	20,493 円/ 時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム (試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific 試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置	学外	委託利用	20,493 円/ 時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム (高速液体クロマトグラフィー)	Glison 高速液体クロマトグラフィー	学内	本人利用	4,455 円/ 時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム (高速液体クロマトグラフィー)	Glison 高速液体クロマトグラフィー	学内	委託利用	4,455 円/ 時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム (高速液体クロマトグラフィー)	Glison 高速液体クロマトグラフィー	学外	本人利用	4,550 円/ 時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム (高速液体クロマトグラフィー)	Glison 高速液体クロマトグラフィー	学外	委託利用	4,550 円/ 時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム (燃烧型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃烧型元素分析装置	学内	本人利用	6,611 円/ 時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム (燃烧型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃烧型元素分析装置	学内	委託利用	6,611 円/ 時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム (燃烧型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃烧型元素分析装置	学外	本人利用	6,745 円/ 時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム (燃烧型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific 燃烧型元素分析装置	学外	委託利用	6,745 円/ 時間	農学研究科
088	透過電子顕微鏡	日立 H-7650	学内	本人利用	12,312 円/ 時間	農学研究科
088	透過電子顕微鏡	日立 H-7650	学外	本人利用	12,933 円/ 時間	農学研究科
089	走査電子顕微鏡 (エネルギー分散型分析装置付)	日立 SU8000(EDAX)	学内	本人利用	7,441 円/ 時間	農学研究科
089	走査電子顕微鏡 (エネルギー分散型分析装置付)	日立 SU8000(EDAX)	学外	本人利用	8,272 円/ 時間	農学研究科
280	次世代シーケンサー MiSeqシステム	MS-J-001 (米)イムネ社製	学内	本人利用	31,733 円/ 日	農学研究科
280	次世代シーケンサー MiSeqシステム	MS-J-001 (米)イムネ社製	学外	本人利用	45,021 円/ 日	農学研究科
281	農水産物・食品および土壌放射能測定装置	GEM30P4-70 (米) ORTEC社製	学内	本人利用	2,591 円/ 時間	農学研究科
281	農水産物・食品および土壌放射能測定装置	GEM30P4-70 (米) ORTEC社製	学外	本人利用	2,739 円/ 時間	農学研究科
282	全自動元素分析装置	(独) エレメンタール社製 vario MAX CNS	学内	本人利用	10,346 円/ 時間	農学研究科
614	70-サイトメーター Attune NxT	(米) サモフィッシャー・サイエンティフィック社製 A24858	学内	本人利用	12,317 円/ 時間	農学研究科
614	70-サイトメーター Attune NxT	(米) サモフィッシャー・サイエンティフィック社製 A24858	学内	委託利用	12,317 円/ 時間	農学研究科
614	70-サイトメーター Attune NxT	(米) サモフィッシャー・サイエンティフィック社製 A24858	学外	本人利用	12,602 円/ 時間	農学研究科
614	70-サイトメーター Attune NxT	(米) サモフィッシャー・サイエンティフィック社製 A24858	学外	委託利用	12,602 円/ 時間	農学研究科
659	人工光型小型ファイトトロン M1	日本医化器械製作所、LPH-0.3PHH	学内	本人利用	2,681 円/ 日	農学研究科
659	人工光型小型ファイトトロン M1	日本医化器械製作所、LPH-0.3PHH	学外	本人利用	4,424 円/ 日	農学研究科
660	高機能型人工気象室 No.1	日本医化器械製作所、LPH-0.5P-SH	学内	本人利用	2,615 円/ 日	農学研究科

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金 (円:税込)	管理部署
661	高性能型人工気象室 No.2	日本医化器械製作所、LPH-0.5P-SH	学内	本人利用	2,615 円/ 日	農学研究科
697	光合成測定機器	(独) Heinz Walz社 DUAL-PAM-100	学内	本人利用	11,347 円/ 日	農学研究科
697	光合成測定機器	(独) Heinz Walz社 DUAL-PAM-100	学外	本人利用	16,269 円/ 日	農学研究科
713	DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置	(株) 島津製作所製 MCE-202 MultiNA	学内	本人利用	3,904 円/ 時間	農学研究科
713	DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置	(株) 島津製作所製 MCE-202 MultiNA	学外	本人利用	3,938 円/ 時間	農学研究科
714	リアルタイムPCR解析システム	パイオラッドラボラトリーズ (株) 製 CFX96 Touch	学内	本人利用	3,838 円/ 時間	農学研究科
714	リアルタイムPCR解析システム	パイオラッドラボラトリーズ (株) 製 CFX96 Touch	学外	本人利用	3,903 円/ 時間	農学研究科
715	ユニバーサルコンパ 外遠心機	(米)サモフィッシャーサイエンティフィック社製 Sorvall ST 8FR	学内	本人利用	3,838 円/ 時間	農学研究科
715	ユニバーサルコンパ 外遠心機	(米)サモフィッシャーサイエンティフィック社製 Sorvall ST 8FR	学外	本人利用	3,847 円/ 時間	農学研究科
716	マルチピーズショッカー	安井器械(株)製	学内	本人利用	3,844 円/ 時間	農学研究科
716	マルチピーズショッカー	安井器械(株)製	学外	本人利用	3,898 円/ 時間	農学研究科
717	サマルサイクラー	(米)サモフィッシャーサイエンティフィック社製 MiniAmp Plus	学内	本人利用	3,827 円/ 時間	農学研究科
717	サマルサイクラー	(米)サモフィッシャーサイエンティフィック社製 MiniAmp Plus	学外	本人利用	3,836 円/ 時間	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	(独)ブルカー・バイオスピン社製 AVANCE NE0600	学内	本人利用	4,062 円/ 時間	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	(独)ブルカー・バイオスピン社製 AVANCE NE0600	学外	本人利用	5,998 円/ 時間	農学研究科
762	ドラフトチャンバー	Dalton社製DF-11AK	学内	本人利用	4,384 円/ 時間	農学研究科
762	ドラフトチャンバー	Dalton社製DF-11AK	学外	本人利用	4,384 円/ 時間	農学研究科
190	PASシステム	OG技研 PASシステムスティムレーターGD-601、プログラムユニットGD-602	学外	本人利用	592 円/ 時間	病院
221	分離用超遠心機	himac CP80WX 日立工機(株)製	学内	本人利用	3,095 円/ 時間	病院
221	分離用超遠心機	himac CP80WX 日立工機(株)製	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
221	分離用超遠心機	himac CP80WX 日立工機(株)製	学外	本人利用	3,960 円/ 時間	病院
221	分離用超遠心機	himac CP80WX 日立工機(株)製	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	ベクトン・ディッキンソン社製	学内	本人利用	4,788 円/ 時間	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	ベクトン・ディッキンソン社製	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	ベクトン・ディッキンソン社製	学外	本人利用	6,059 円/ 時間	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	ベクトン・ディッキンソン社製	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
349	TissueFAXS i4 測定ユニット	(オーストリア)Tissue Gnostics社製 TG-9101-T	学内	本人利用	3,057 円/ 時間	病院
349	TissueFAXS i4 測定ユニット	(オーストリア)Tissue Gnostics社製 TG-9101-T	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
349	TissueFAXS i4 測定ユニット	(オーストリア)Tissue Gnostics社製 TG-9101-T	学外	本人利用	4,036 円/ 時間	病院
349	TissueFAXS i4 測定ユニット	(オーストリア)Tissue Gnostics社製 TG-9101-T	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
352	TissueFAXS細胞解析ソフトウェアシステム	(米)Tissue Gnostics社製 TG-2-200/202	学内	本人利用	2,678 円/ 時間	病院
352	TissueFAXS細胞解析ソフトウェアシステム	(米)Tissue Gnostics社製 TG-2-200/202	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
352	TissueFAXS細胞解析ソフトウェアシステム	(米)Tissue Gnostics社製 TG-2-200/202	学外	本人利用	3,202 円/ 時間	病院
352	TissueFAXS細胞解析ソフトウェアシステム	(米)Tissue Gnostics社製 TG-2-200/202	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
395	フローサイトメーター LSRFortessa	ベクトン・ディッキンソン社製	学内	本人利用	5,226 円/ 時間	病院
395	フローサイトメーター LSRFortessa	ベクトン・ディッキンソン社製	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
395	フローサイトメーター LSRFortessa	ベクトン・ディッキンソン社製	学外	本人利用	7,480 円/ 時間	病院
395	フローサイトメーター LSRFortessa	ベクトン・ディッキンソン社製	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
396	HSオールインワン蛍光顕微鏡	BZ-9000 (株)キーエンス製	学内	本人利用	2,476 円/ 時間	病院
396	HSオールインワン蛍光顕微鏡	BZ-9000 (株)キーエンス製	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
396	HSオールインワン蛍光顕微鏡	BZ-9000 (株)キーエンス製	学外	本人利用	3,456 円/ 時間	病院
396	HSオールインワン蛍光顕微鏡	BZ-9000 (株)キーエンス製	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
419	共焦点レーザー顕微鏡システム	Nikon製C2si	学内	本人利用	3,558 円/ 時間	病院
419	共焦点レーザー顕微鏡システム	Nikon製C2si	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
419	共焦点レーザー顕微鏡システム	Nikon製C2si	学外	本人利用	5,309 円/ 時間	病院
419	共焦点レーザー顕微鏡システム	Nikon製C2si	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
557	ナノ粒子解析システムNanoSight	(蘭) マルバーン・バナリティカル社製 NTA5330	学内	本人利用	2,661 円/ 時間	病院
557	ナノ粒子解析システムNanoSight	(蘭) マルバーン・バナリティカル社製 NTA5330	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
557	ナノ粒子解析システムNanoSight	(蘭) マルバーン・バナリティカル社製 NTA5330	学外	本人利用	3,908 円/ 時間	病院
557	ナノ粒子解析システムNanoSight	(蘭) マルバーン・バナリティカル社製 NTA5330	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
558	Droplet Generatorシステム	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製 QX200 1864002TA	学内	本人利用	2,429 円/ 時間	病院
558	Droplet Generatorシステム	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製 QX200 1864002TA	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
558	Droplet Generatorシステム	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製 QX200 1864002TA	学外	本人利用	2,770 円/ 時間	病院
558	Droplet Generatorシステム	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製 QX200 1864002TA	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
559	T100サーマルサイクラー	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製	学内	本人利用	2,321 円/ 時間	病院
559	T100サーマルサイクラー	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
559	T100サーマルサイクラー	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製	学外	本人利用	2,368 円/ 時間	病院
559	T100サーマルサイクラー	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
560	Droplet Readerシステム	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製 QX200 1864003TA	学内	本人利用	11,526 円/ 時間	病院
560	Droplet Readerシステム	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製 QX200 1864003TA	学内	施設使用料	2,100 円/ 日	病院

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用区分	利用形態	利用料金（円：税込）	管理部署
560	Droplet Readerシステム	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製 QX200 1864003TA	学外	本人利用	12,538 円/ 時間	病院
560	Droplet Readerシステム	(米) バイオラッド・ラボラトリーズ社製 QX200 1864003TA	学外	施設使用料	2,100 円/ 日	病院
707	デジタルミックスアレイ - n CounterMAX	(米) NanoString社製	学内	本人利用	4,620 円/ 時間	病院
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学内	本人利用	612 円/ 時間	薬学研究科
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学内	技術指導料：事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学内	技術指導料：サポート料	1,155 円/ 時間	薬学研究科
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学外	本人利用	2,030 円/ 時間	薬学研究科
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学外	技術指導料：事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
022	高精密質量分析装置（1）	Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos	学外	技術指導料：サポート料	2,310 円/ 時間	薬学研究科
023	高精密質量分析装置（2）	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学内	本人利用	612 円/ 時間	薬学研究科
023	高精密質量分析装置（2）	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学内	技術指導料：事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
023	高精密質量分析装置（2）	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学内	技術指導料：サポート料	1,155 円/ 時間	薬学研究科
023	高精密質量分析装置（2）	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学外	本人利用	1,220 円/ 時間	薬学研究科
023	高精密質量分析装置（2）	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学外	技術指導料：事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
023	高精密質量分析装置（2）	Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Exactive	学外	技術指導料：サポート料	2,310 円/ 時間	薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学内	本人利用	612 円/ 時間	薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学内	技術指導料：事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学内	技術指導料：サポート料	1,155 円/ 時間	薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学外	本人利用	1,409 円/ 時間	薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学外	技術指導料：事前講習料	11,550 円/ 回	薬学研究科
024	高精密質量分析装置（3）	Thermo Fisher Scientific TSQ Vantage	学外	技術指導料：サポート料	2,310 円/ 時間	薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	(米)イルミナ社製	部局内	本人利用	12,071 円/ 日	薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	(米)イルミナ社製	学内	本人利用	12,071 円/ 日	薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	(米)イルミナ社製	学外	本人利用	29,251 円/ 日	薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	(米) ベックマンコルター社製	部局内	本人利用	415 円/ 時間	薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	(米) ベックマンコルター社製	学内	本人利用	415 円/ 時間	薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	(米) ベックマンコルター社製	学外	本人利用	4,423 円/ 時間	薬学研究科
689	フローサイトメーションシステム	ベックマンコルター社製	部局内	本人利用	354 円/ 時間	薬学研究科
689	フローサイトメーションシステム	ベックマンコルター社製	学内	本人利用	354 円/ 時間	薬学研究科
689	フローサイトメーションシステム	ベックマンコルター社製	学外	本人利用	1,787 円/ 時間	薬学研究科
010	質量分析装置（ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析装置）	日本電子 JMS-T100GCV	部局内	委託利用	5,313 円/ 時間	理学研究科
010	質量分析装置（ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析装置）	日本電子 JMS-T100GCV	学内	委託利用	5,313 円/ 時間	理学研究科
010	質量分析装置（ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析装置）	日本電子 JMS-T100GCV	学外	委託利用	14,206 円/ 時間	理学研究科
014	微量分析装置（炭素・水素・窒素同時定量装置マイクロコーダ）	ジェイ・サイエンス JM-11	部局内	委託利用	3,811 円/ 時間	理学研究科
014	微量分析装置（炭素・水素・窒素同時定量装置マイクロコーダ）	ジェイ・サイエンス JM-11	学内	委託利用	3,811 円/ 時間	理学研究科
014	微量分析装置（炭素・水素・窒素同時定量装置マイクロコーダ）	ジェイ・サイエンス JM-11	学外	委託利用	4,387 円/ 時間	理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	部局内	本人利用	5,205 円/ 時間	理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	学内	本人利用	5,205 円/ 時間	理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	学外	本人利用	9,182 円/ 時間	理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立 S-5500形	学外	委託利用	12,647 円/ 時間	理学研究科

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかることがあります。

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込）/その他の手続	管理部署
025	多次元材料組成分析システム	日本電子 JSM-8500F外	本学に別途設置されている「工学研究科・工学部 合同計測分析班」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、工学研究科・工学部 合同計測分析班のページ (http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html) をご確認ください。	工学研究科（マテリアル・開発系）
029	三次元微小構造解析システム	日本電子 JEM-ARM200F(UHR)、日本電子 JIB-4600F		工学研究科（マテリアル・開発系）
241	同時角度分解型XPSシステム	Thermo Fisher Scientific ThetaProbe		工学研究科（マテリアル・開発系）
246	日本電子(株)製 サーマル電界放出形走査電子顕微鏡	JEOL JSM-7800F		工学研究科（マテリアル・開発系）
256	イオンビームミリング装置 エンドポイント分析器仕様	伯東 IBE-KDC75-TU-T-S		ご利用手続きについては「マテリアル開発系杉本研究室」機器担当者までお問い合わせください。
237	極微細スピンメモリ素子用電子描画装置	日本電子 JBX-6300SK	本学に別途設置されている「マイクロ・ナノマシニング研究教育センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターのページ (https://web.tohoku.ac.jp/mnc/) をご確認ください。	工学研究科（機械・知能系）
239	超高分解能分析走査型電子顕微鏡 一式	日立ハイテクノロジー SU-70形		工学研究科（機械・知能系）
242	レーザー直線描画装置 一式	Heidelberg Instruments Mikrotechnik DWL2000SD		工学研究科（機械・知能系）
244	住友精密工業(株)製 Deep RIE装置 一式	住友精密工業 MUC21 SR		工学研究科（機械・知能系）
247	薄膜形成用プラズマCVD装置	サムコ PD-220NL		工学研究科（機械・知能系）
253	光洋サーモシステム(株)製 ランプアニールシステム	光洋サーモシステム RLA-1208-V		工学研究科（機械・知能系）
257	TEOS PECVD システム 一式	サムコ PD-100ST		工学研究科（機械・知能系）
259	SMI500ナノ加工顕微鏡システム 一式	日立ハイテックスサイエンス(エスアイアイ・ナノテクノロジー) SMI500		工学研究科（機械・知能系）
260	光洋サーモシステム(株)製 横型システム 一式	光洋サーモシステム 272A-M200		工学研究科（機械・知能系）
263	多入射角高速分光エリプソメータ	J.A.Woollam M-2000D-Tm		工学研究科（機械・知能系）
264	高周波振動レーザー観察システム	Polytec		工学研究科（機械・知能系）
272	分光エリプソメータ	HORIBA JOBIN YVON UVISEL LT NIR-OWG		工学研究科（機械・知能系）
520	全真空顕微FTIR			工学研究科（機械・知能系）
521	ESCA分析装置	アルバック・ファイ Model 3057VC		工学研究科（機械・知能系）
254	フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光 FT/IR-6300ST		本学に別途設置されている「工学部・工学研究科技術部 合同計測分析班」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、工学部・工学研究科技術部合同計測分析班のページ (http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html) をご確認ください。
271	レーザーラマン分光光度計システム	日本分光 NRS-5100AMS	工学研究科（本部）	
279	全自動波長分散型蛍光X線分析装置	BrukerAX S8 TIGER(1kW)	工学研究科（本部）	
541	ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC-MS)	Agilent 6890N, 5975C	工学研究科（本部）	
542	二重収束質量分析計	日本電子 JMS-700	工学研究科（本部）	
543	レーザー回析式粒度分布測定装置	Malvern Instruments マスターサイザー3000	工学研究科（本部）	
331	走査型電子顕微鏡 1式	日立ハイテクノロジー SU-70、S-3400N、EDX	本学に別途設置されている「未来科学技術共同研究センター内先端的経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、未来科学技術共同研究センター内先端的経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室のページ (http://www.fri.niche.tohoku.ac.jp/innovation/) をご確認ください。	NICHe
333	レーザー熱衝撃疲労試験装置 一式	レーザー熱衝撃疲労試験装置 一式		NICHe
334	超微小硬度計 1式	島津製作所 DUH-211S特型外		NICHe
335	デジタル画像相関ひずみ計測システム 一式	Correlated Solutions 高解像度 CCDカメラ 2台 外		NICHe
620	顕微ラマン分光分析装置	堀場製作所 LabRAM HR800		NICHe
621	ナノレンジ押し込み硬さ試験機	フィッシャー・インストルメンツ PICODENTOR HM500		NICHe
622	デジタルピッカース硬さ試験機	マツザワ VMT-X7S		NICHe
623	ショア硬度計	今井精機 ショア硬度計D型		NICHe
624	油圧サーボ式材料疲労試験装置 (1)	MTS MODEL 810		NICHe
625	油圧サーボ式材料疲労試験装置 (2)	MTS MODEL 810		NICHe
629	熱分析装置	リガク Thermo plus EVO 2 シリーズ(TG 8121、DSC 8231)		NICHe
630	アコースティックエミッション装置	Physical Acoustics AEシステム一式		NICHe
631	小型表面粗さ測定機	小坂研究所 SE 300-39		NICHe
656	高温高圧水中応力腐食割れ装置	東伸工業 試験装置一式		NICHe
662	2軸2連高温高圧腐食試験装置	東伸工業 2M-SERT-30		NICHe

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続	管理部局
663	オートクレープ付SERT試験装置	東伸工業 試験装置一式（試験装置、SERT-MINI-20PT型、循環装置20MP-09-350型）	本学に別途設置されている「未来科学技術共同研究センター内先端的経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、未来科学技術共同研究センター内先端的経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室のページ（ http://www.fri.niche.tohoku.ac.jp/innovation/ ）をご確認ください。	NICHe
664	光学顕微鏡	ニコン LV150 FMモジュールセット		NICHe
665	実体顕微鏡ティーチングシステム	ニコン SMZ1500		NICHe
018	生体低分子測定装置 メタボローム解析用質量分析計 イメージング質量分析装置	Thermo Fisher Scientific MALDI LTQ XL	本学に別途設置されている「医学系研究科共通機器室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、医学系研究科共通機器室のページ（ https://www.brc.med.tohoku.ac.jp/ ）をご確認ください。	医学系研究科
019	MALDI-MSイメージングシステム	島津製作所 AXIMA Performance		医学系研究科
021	多検体微量遺伝子定量装置	Fluidigm BioMark HD-QPCR		医学系研究科
087	組織構造解析装置 バイオマテリアル用電子顕微鏡 透過電子顕微鏡システム	日本電子 JEM-1400		医学系研究科
005	3テスラ磁気共鳴装置	Philips社製 Achieva dStream 3.0T	3T-MRI管理委員会事務局	加齢医学研究所
672	X線光電子分光分析装置	島津製作所 AXIS-ULTRA	本学に別途設置されている「工学研究科技術部合同計測分析班」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、工学研究科技術部合同計測分析班のページ（ http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html ）をご確認ください。	工学研究科（化学・バイオ系）
323	P-タイプ同軸型ゲルマニウム半導体検出器		本学に別途設置されている「CYRIC共同利用RI共同利用」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、CYRIC共同利用RI共同利用のページ（ http://www.cyric.tohoku.ac.jp/index_j.html ）をご確認ください。	サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
324	N-タイプ同軸型ゲルマニウム半導体検出器			サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
325	Typhoon FLA 9500 BGR システム	GEヘルスケア Typhoon FLA 9500 BGRシステム		サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
326	狭帯域波長可変レーザー	Coherent MBR-110HP		サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
327	アキュフレックスガンマ	日立アロカメディカル ARC- 7001		サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
328	アキュフレックスガンマ	日立アロカメディカル ARC- 7001		サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
329	縦単一周波数半導体励起18Wグリーンレーザー	Coherent Verdi-V18 SF		サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター
693	スーパーコンピュータAOBA （サブシステムA）	日本電気 SX-Aurora TSUBASA	本計算機システムは、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)により運用されています。また、革新的ハイパフォーマンスインフラ(HPCI)システムへ計算機資源の提供も行っています。利用申込みは、下記ページをご確認ください。	サイバーサイエンスセンター
694	スーパーコンピュータAOBA （サブシステムB）	日本電気 SX-Aurora LX406Rz- 2	・一般利用（学術利用、民間企業利用、大判プリンタ等の施設利用） https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/ ・JHPCN課題利用 https://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/ ・HPCI課題利用 http://www.hpci-office.jp/	サイバーサイエンスセンター
085	サブオングストローム電子顕微鏡	FEI Titan80-300	本学に別途設置されている「ナノテク融合技術支援センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、ナノテク融合技術支援センターのページ（ http://cints-tohoku.jp/index.htm ）をご確認ください。	先端電子顕微鏡センター
086	低加速高分解能走査電子顕微鏡	日立SU8000		先端電子顕微鏡センター
337	超高分解能収差補正型走査透過電子顕微鏡システム	FEI Titan G2 60-300型		先端電子顕微鏡センター
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific ELEMENT ICP-MS	本学に別途設置されている「東北大学多元物質科学研究所セントラル アナリティカルファシリティ（多元CAF）」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、東北大学多元物質科学研究所セントラルアナリティカルファシリティ（多元CAF）のページ（ http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/research/caf.html ）をご確認ください。	多元物質科学研究所
112	高電圧パルス選択性粉碎装置	SEIFRAG AG SELFRAG Lab S2.0		多元物質科学研究所
390	高精度構造解析質量分析システムQ-TOF	Bruker Daltonics micrOTOF-Q II-S1		多元物質科学研究所
392	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置MALDI-TOF	Bruker Daltonics autoflex Speed-S1		多元物質科学研究所
720	水素アニール装置	自作	本設備・装置の利用申込は、「ナノテク融合技術支援センター(CINTS)（ https://www.cints.tohoku.ac.jp/ ）」からお願いいたします。	マイクロシステム融合研究開発センター
721	EVG プラズマ活性化装置	EVG EVG810		マイクロシステム融合研究開発センター
722	酸化炉(8")	光洋サーモシステム MT-10× 8-A		マイクロシステム融合研究開発センター
765	自動搬送 芝浦スパッタ装置 冷却型	芝浦メカトロニクス CFS-4EP- LL	本学に別途設置されている「ナノテク融合技術支援センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、ナノテク融合技術支援センターのページ（ http://cints-tohoku.jp/index.htm ）をご確認ください。	マイクロシステム融合研究開発センター
766	測長SEM	日立ハイテク CS4800		マイクロシステム融合研究開発センター
767	8インチマスクアライナ	SUSS MicroTec MA8 GEN3 TOU-01		マイクロシステム融合研究開発センター
768	真空アニール炉	真空理工 RHL-Pss98/98#		マイクロシステム融合研究開発センター
769	シンクロンスパッタ	シンクロン RAS-1100B II		マイクロシステム融合研究開発センター
770	半導体パラメータアナライザ	Keysight B1500A SMU B1511B x4 GNDU		マイクロシステム融合研究開発センター

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金 (円：税込) / その他の手続	管理部局
248	住友 PECVD	住友精密 MPX-CVD	本設備・装置の利用申込は、「ナノテク融合技術支援センター(CINTS) (https://www.cints.tohoku.ac.jp/)」からお願いいたします。	マイクロシステム融合研究開発センター
250	熱CVD	国際電気		マイクロシステム融合研究開発センター
251	XRD	Bruker D8 DISCOVER		マイクロシステム融合研究開発センター
252	DeepRIE装置#1	住友精密 MUC-21		マイクロシステム融合研究開発センター
278	芝浦 スパッタ装置	芝浦メカトロニクス CFS-4ESII		マイクロシステム融合研究開発センター
341	MOCVD装置	ワコム研究所製 Doctor-T		マイクロシステム融合研究開発センター
342	エリオニクス 130kV EB描画装置	エリオニクス ELS-G125S		マイクロシステム融合研究開発センター
343	サーフェイスプレナー	ディスコ DAS8920		マイクロシステム融合研究開発センター
344	マイクロX線CT	コムスキャンテクノ ScanXmate-D160TS110		マイクロシステム融合研究開発センター
345	熱電子SEM	日立ハイテクノロジーズ S-3700N型・堀場製作所 EMAX Energy		マイクロシステム融合研究開発センター
346	超音波顕微鏡	インサイト IS-350型 S-U		マイクロシステム融合研究開発センター
347	ブラシスクラバ	全協化成工業		マイクロシステム融合研究開発センター
348	デジタル顕微鏡	KEYENCE VHX-1000		マイクロシステム融合研究開発センター
359	酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	ユーテック 21-0604		マイクロシステム融合研究開発センター
360	両面マスクアライナ	SUSS MicroTec SUSS MA6/BA6 SPEC TOU-2		マイクロシステム融合研究開発センター
361	多元材料原子層堆積 (ALD) 装置	テクノファイン ALK-600		マイクロシステム融合研究開発センター
362	ME-RIE装置	立山マシン TEP-01C1		マイクロシステム融合研究開発センター
363	Vapor HFエッチング装置	Primaxx uEtch Module TO-α		マイクロシステム融合研究開発センター
364	芝浦スパッタ装置 (冷却形)	芝浦メカトロニクス CFS-4ES-C.T.		マイクロシステム融合研究開発センター
420	エッチングチャンバー	アズワン PSH1200		マイクロシステム融合研究開発センター
421	リン酸槽			マイクロシステム融合研究開発センター
422	イナートオープン (シンター炉)	ヤマト科学 DN63H		マイクロシステム融合研究開発センター
423	真空オープン	ヤマト科学 DP-31		マイクロシステム融合研究開発センター
424	スピン乾燥機	東邦化成 ZAA-4		マイクロシステム融合研究開発センター
425	有機ドラフトチャンバー			マイクロシステム融合研究開発センター
426	4"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101		マイクロシステム融合研究開発センター
427	6"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101		マイクロシステム融合研究開発センター
429	スピンコータ	ミカサ 1H-DXII		マイクロシステム融合研究開発センター
430	クリーンオープン	ヤマト科学 DE62		マイクロシステム融合研究開発センター
431	ポリイミドキュア炉	ヤマト科学 DN43H		マイクロシステム融合研究開発センター
434	現像ドラフト			マイクロシステム融合研究開発センター
435	UVキュア装置	ウシオ電機 UMA-802		マイクロシステム融合研究開発センター
436	スピンコータ	アクテス ASC-4000		マイクロシステム融合研究開発センター
437	スプレー現像装置	アクテス ADE-3000S		マイクロシステム融合研究開発センター
438	レーザ描画装置	ハイデルベルグ・インストルメンツ DWL2000CE		マイクロシステム融合研究開発センター
439	球面露光装置	東北電子産業		マイクロシステム融合研究開発センター
440	酸化炉 (半導体用)	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
441	酸化炉 (MEMS用)	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
442	P拡散炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
443	P押し込み炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
444	B拡散炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
445	B押し込み炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
446	アニール炉	東京エレクトロン XL-7		マイクロシステム融合研究開発センター
447	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 NH-20SR		マイクロシステム融合研究開発センター
449	ランプアニール装置	AG Associates AG4100		マイクロシステム融合研究開発センター
450	メタル拡散炉	光洋リンドバーグ Model270		マイクロシステム融合研究開発センター
451	LPCVD (SiN)	システムサービス		マイクロシステム融合研究開発センター
452	LPCVD (Poly-Si)	システムサービス		マイクロシステム融合研究開発センター
453	LPCVD (SiO ₂ , SiON)	システムサービス		マイクロシステム融合研究開発センター
454	W-CVD	Applied Materials P-5000		マイクロシステム融合研究開発センター
455	アネルバ スパッタ装置	アネルバ SPF-730		マイクロシステム融合研究開発センター
456	電子ビーム蒸着装置	アネルバ EVC-1501		マイクロシステム融合研究開発センター

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続	管理部局
457	ゾルゲル自動成膜装置	テクノファイン PZ-604		マイクロシステム融合研究開発センター
458	めっき装置	山本鍍金試験器		マイクロシステム融合研究開発センター
459	JPEL PECVD	日本生産技術研究所 VDS-5600		マイクロシステム融合研究開発センター
460	住友 TEOS PECVD	住友精密 MPX-CVD		マイクロシステム融合研究開発センター
461	自動搬送 芝浦スパッタ装置	芝浦メカトロニクス i-Miller CFS-4EP-LL		マイクロシステム融合研究開発センター
462	球面成膜用スパッタ装置	和泉テック		マイクロシステム融合研究開発センター
463	DeepRIE装置#2	住友精密 MUC-21		マイクロシステム融合研究開発センター
464	DeepRIE装置#3	STS		マイクロシステム融合研究開発センター
465	アネルバ RIE装置	アネルバ DEA-506		マイクロシステム融合研究開発センター
466	アネルバ Si-RIE装置	アネルバ L-507DL		マイクロシステム融合研究開発センター
467	AI-RIE	芝浦エレテック HIRRIE-100		マイクロシステム融合研究開発センター
468	アルバック アッシング装置	アルバック UNA-2000		マイクロシステム融合研究開発センター
469	ブランソン アッシング装置	ブランソン IPC4000		マイクロシステム融合研究開発センター
471	アルバック 多用途RIE装置	アルバック RIH-1515Z		マイクロシステム融合研究開発センター
472	KOHエッチング槽			マイクロシステム融合研究開発センター
473	TMAHエッチング槽			マイクロシステム融合研究開発センター
474	DeepRIE装置#4	住友精密 MUC-21		マイクロシステム融合研究開発センター
475	イオンミリング装置	エヌ・エス/伯東 20IBE-C	本設備・装置の利用申込は、「ナノテク融合技術支援センター(CINTS) (https://www.cints.tohoku.ac.jp/)」からお願いいたします。	マイクロシステム融合研究開発センター
476	アルバックICP-RIE	アルバック NE-550		マイクロシステム融合研究開発センター
477	ケミカルドライエッチャー (CDE)	芝浦エレテック CDE7		マイクロシステム融合研究開発センター
478	プラズマクリーナ	ヤマト科学 PDC-210		マイクロシステム融合研究開発センター
479	ウェハ接合装置	Suss SB6e		マイクロシステム融合研究開発センター
480	東京精密 ダイサ	東京精密		マイクロシステム融合研究開発センター
481	ディスコ ダイサ	ディスコ DAD522		マイクロシステム融合研究開発センター
482	ワイヤボンダ	West Bond		マイクロシステム融合研究開発センター
483	レーザマーカ	GSIルモニクス WM-II		マイクロシステム融合研究開発センター
484	6インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni62		マイクロシステム融合研究開発センター
485	4インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー Bni52		マイクロシステム融合研究開発センター
486	サンドブラスト	新東		マイクロシステム融合研究開発センター
487	EVG ウェハ接合装置	EVG 520		マイクロシステム融合研究開発センター
488	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG Smart View Aligner		マイクロシステム融合研究開発センター
489	UVインプリント装置	東芝機械 ST-50		マイクロシステム融合研究開発センター
490	熱インプリント装置	オリジン電気 Reprina-T50A		マイクロシステム融合研究開発センター
491	エキシマ洗浄装置	デアネヒステ EXC-1201-DN		マイクロシステム融合研究開発センター
492	ウォーターレーザ	澁谷工業 LAMICS AQL-1900		マイクロシステム融合研究開発センター
493	ウェハゴミ検査装置	トプコン WM-3		マイクロシステム融合研究開発センター
494	膜厚計	ナノメトリクス NanoSpec3000		マイクロシステム融合研究開発センター
495	Dektak 段差計	Dektak Dektak 8		マイクロシステム融合研究開発センター
496	Tenchor 段差計	Tenchor AlphaStep 500		マイクロシステム融合研究開発センター
497	深さ測定装置	ユニオン光学 Hisomet		マイクロシステム融合研究開発センター
498	4探針測定装置			マイクロシステム融合研究開発センター
499	拡がり抵抗測定装置	Solid State Measurements SSM150		マイクロシステム融合研究開発センター
500	ウェハプローバ	東京精密 EM-20A		マイクロシステム融合研究開発センター
501	金属顕微鏡	ニコン L150		マイクロシステム融合研究開発センター
502	FE-SEM	日立ハイテクノロジー S5000		マイクロシステム融合研究開発センター
503	エリプソ	アルバック		マイクロシステム融合研究開発センター
504	赤外線顕微鏡	オリンパス/浜松ホトニクス		マイクロシステム融合研究開発センター
505	四重極質量分析装置	キヤノンアネルバ M-101QA-TDM		マイクロシステム融合研究開発センター
507	クイックコータ	サンヨー電子 SC-701M k II		マイクロシステム融合研究開発センター
508	卓上型エリプソ	フォトニックラティス SE-101		マイクロシステム融合研究開発センター
510	レーザ/白色光共焦点顕微鏡	レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD		マイクロシステム融合研究開発センター
511	直線集束ビーム超音波材料解析システム#1			マイクロシステム融合研究開発センター

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込）/その他の手続	管理部局	
512	直線集束ビーム超音波材料解析システム#2		本設備・装置の利用申込は、「ナノテク融合技術支援センター(CINTS) (https://www.cints.tohoku.ac.jp/)」からお願いいたします。	マイクロシステム融合研究開発センター	
632	アルバックICP-RIE#2	アルバック CE-300I		マイクロシステム融合研究開発センター	
633	アネルバマルチスパッタ	アネルバ SPC-350		マイクロシステム融合研究開発センター	
635	マスクレスアライナ	Heidelberg Instruments MLA150tt		マイクロシステム融合研究開発センター	
681	ECRロングスロースパッタ	エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK		マイクロシステム融合研究開発センター	
682	住友 TEOS PECVD#2	住友精密 APX-Cetus		マイクロシステム融合研究開発センター	
683	i線ステッパ	キヤノン FPA-3030i5+		マイクロシステム融合研究開発センター	
684	コータデベロッパ	SUSS ACS200 Gen3		マイクロシステム融合研究開発センター	
685	JEOL FE-SEM	日本電子 JSM-6335F		マイクロシステム融合研究開発センター	
708	パークシステムズAFM	パークシステムズ NX20		マイクロシステム融合研究開発センター	
735	エリオニクス 50kV EB描画装置	エリオニクス ELS-7500EXTK		マイクロシステム融合研究開発センター	
736	Zygo Nexview	Zygo Nexview		マイクロシステム融合研究開発センター	
737	2光子励起顕微鏡	ライカ TCS SP8 MP STED		マイクロシステム融合研究開発センター	
738	サブフェムト・インクジェット	SIJテクノロジー PR-150THU		マイクロシステム融合研究開発センター	
739	光造形3Dプリンター	DigitalWAX 028J-PLUS		マイクロシステム融合研究開発センター	
723	クライオ電子顕微鏡装置	日本電子 JEM-3300 CRYOARM300 II		本学に別途設置されている「未来型医療創成センター (INGEM)」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、未来型医療創成センター (INGEM) のページ (https://www.ingem.oas.tohoku.ac.jp/cryoem/) をご確認ください。	未来型医療創成センター
003	フーリエ変換型超伝導核磁気共鳴装置	Bruker BioSpin AVANCE NEO 700MHz 外		本学に別途設置されている「巨大分子解析研究センター 解析研究部門」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、巨大分子解析研究センター 解析研究部門のページ (http://www.kiki.chem.tohoku.ac.jp/index.html) をご確認ください。	理学研究科
208	IVIS Spectrum CT Imaging System	Caliper Life Sciences IVIS Spectrum		本学に別途設置されている「医学系研究科共通機器室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、医学系研究科共通機器室のページ (https://www.brc.med.tohoku.ac.jp/) をご確認ください。	医学系研究科
209	核磁気共鳴イメージング装置	Bruker AVANCE III 400WB			医学系研究科
210	フローサイトメーター	Becton Dickinson FACS SORP	医学系研究科		
211	フローサイトメーター	Becton Dickinson FACS Aria III	医学系研究科		
212	共焦点スペクトルイメージャー	Carl Zeiss Microscopy LSM780	医学系研究科		
216	ジェネティックアナライザ	Life Technologies Applied Biosystems 3500xL	医学系研究科		
217	ジェネティックアナライザ	Life Technologies Applied Biosystems 3500xL	医学系研究科		
218	低酸素ワークステーション	Ruskin Technology Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS	医学系研究科		
219	ハイエンドマルチプレートリーダーシステム	BMG LABTECH PHERAstar FS-36 P/N:471-301-6	医学系研究科		
222	共焦点・超解像顕微鏡システム	ニコン 超解像/共焦点顕微鏡 N-SIM+A1セット	医学系研究科		
223	スペクトル型セルアナライザー	ソニー SP6800ZE 3レーザータイプ	医学系研究科		
518	高分解能共焦点レーザー顕微鏡システム	Carl Zeiss Microscopy LSM800	医学系研究科		
677	リサーチスライドスキャナー	オリンパス VS200	医学系研究科		
678	データ遠隔解析用ノートパソコン No.1	DELL Precision 7550Pro	医学系研究科		
679	データ遠隔解析用ノートパソコン No.2	DELL Precision 7550Pro	医学系研究科		
284	イオン注入装置	アルバック IMX-3500	本学に別途設置されている「マイクロ・ナノマシニング研究教育センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターのページ (https://web.tohoku.ac.jp/mnc/) をご確認ください。	工学研究科	
287	ドライエッチング装置	アルバック NE-550	工学研究科		
302	in vivoイメージング装置 一式	Caliper IVIS Lumina2 Imaging System	本学に別途設置されている「加齢医学研究所共通機器運営委員会、共通機器管理室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、加齢医学研究所共通機器運営委員会、共通機器管理室の該当ページをご確認ください。 所内からの利用： http://www.idac.tohoku.ac.jp/idac2014_se/ja/activities/research/common_ic/cic_flow_in.html 学内からの利用： http://www.idac.tohoku.ac.jp/idac2014_se/ja/activities/research/common_ic/cic_flow_out.html 学外からの利用： http://www.idac.tohoku.ac.jp/idac2014_se/ja/activities/research/common_ic/cic_flow_out2.html	加齢医学研究所	
338	ベクトルマグネット回転システム	Cryomagnetics VSC-3070-BL	本学に別途設置されている「極低温科学センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、極低温科学センターの利用予約用アドレス (ltcenter@[@]imr.tohoku.ac.jp) からお申し込みください。	極低温科学センター	

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部局
751	集束イオンビーム加工装置 (Quanta 3D)	Thermo Fisher Scientific	本学に別途設置されている「ナノテク融合技術支援センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、ナノテク融合技術支援センターのページ (https://www.cints.tohoku.ac.jp/application2022/) をご確認ください。			金属材料研究所
752	集束イオンビーム加工装置 (Versa 3D)	Thermo Fisher Scientific				金属材料研究所
753	高出力全自動水平型多目的X線回折装置	リガク SmartLab 9SW				金属材料研究所
754	熱分析装置(Thermo plus EVO II)	リガク				金属材料研究所
755	イオンミリング装置(PIPS II)	GATAN				金属材料研究所
291	スーパーコンピューティングシステム	日立製作所 MASAMUNE-IMR	本学に別途設置されている「金属材料研究所共同利用研究等」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、下記該当する利用枠をご確認ください。 ・金属材料研究所国際共同利用・共同研究（計算材料学センター、研究部）のページ： http://gimrt.www.imr.tohoku.ac.jp/ ・計算物質科学スーパーコンピュータ共用事業のページ： https://www.sc.imr.tohoku.ac.jp/outline/process_3.html ・民間機関等利用サービスのページ： https://www.sc.imr.tohoku.ac.jp/outline/process_4.html			金属材料研究所
527	フーリエ変換顕微赤外分光装置	Thermo Fisher Scientific	本学に別途設置されている「金属材料研究所 共同利用研究」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、金属材料研究所 共同利用研究のページ (http://www-lab.imr.tohoku.ac.jp/~util/) をご確認ください。			金属材料研究所
528	X線装置	パナリティカル				金属材料研究所
548	分析透過電子顕微鏡	TOPCON EM-002B				金属材料研究所
549	透過電子顕微鏡	日本電子 JEM-2000EX II	本学に別途設置されている「金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室」			金属材料研究所
550	原子分解能分析電子顕微鏡	日本電子 JEM-ARM200F	での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室のページ (https://aem-www.imr.tohoku.ac.jp/) をご確認ください。			金属材料研究所
551	イオンミリング加工装置	FISCHINE MODEL 1010				金属材料研究所
552	イオンスライサ加工装置	日本電子 EM-09100 IS				金属材料研究所
553	オスミウムコータ	メイワフォーシス NEOC-PRO				金属材料研究所
759	原子層堆積装置	Veeco Savannah S100	本学に別途設置されている「マイクロ・ナノマシニング研究教育センター」			工学研究科（機械・知能系）
243	超高真空CVD装置	エア・ウォーター VCE-S2103TH	での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターのページ (https://web.tohoku.ac.jp/mnc/) をご確認ください。			工学研究科（機械・知能系）
245	シリコン酸化皮膜形成用O3・TEOS/CVD装置	ユーテック				工学研究科（機械・知能系）
249	マスク露光システム装置	SUSS MicroTec MA8 Gen3 Thu1	ご利用手続きについては「田中（秀）研究室」機器担当者までお問い合わせください。			工学研究科（機械・知能系）
267	イオンビームミリング装置	伯東 IBE-KDC75-THKU-ST				工学研究科（機械・知能系）
270	リアクティブイオンエッチング装置 一式	サムコ RIE-10NR 一式				工学研究科（機械・知能系）
389	SSP3000 スパッタ装置	菅製作所 AV301-B2	本学に別途設置されている「マイクロ・ナノマシニング研究教育センター」			工学研究科（機械・知能系）
519	ペガサスA	SPPテクノロジーMPX Pegasus-Advanced	での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、マイクロ・ナノマシニング研究教育センターのページ (https://web.tohoku.ac.jp/mnc/) をご確認ください。			工学研究科（機械・知能系）
523	断面試料作製研磨装置	クノーテクノクラフト TIC3X-KN-SP				工学研究科（機械・知能系）
524	ダイサー	ディスコ DAD3240				工学研究科（機械・知能系）
525	SPT-RIE装置	SPPテクノロジー MUC-21 ASE-SRE-TO				工学研究科（機械・知能系）
760	オージェ電子分光装置	日本電子 JAMP-9510F				工学研究科（マテリアル・開発系）
666	核磁気共鳴装置	Bruker AV400				工学研究科（化学・バイオ系）
667	電子スピン共鳴装置	JEOL X330				工学研究科（化学・バイオ系）
668	フーリエ変換赤外分光光度計	ThermoFisher Nicolet6700	本学に別途設置されている「工学研究科技術部合同計測分析班」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、工学研究科技術部合同計測分析班のページ (http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html) をご確認ください。			工学研究科（化学・バイオ系）
669	蛍光光度分光計	日立ハイテク F-7000				工学研究科（化学・バイオ系）
670	ICP発光分光分析装置	ThermoFisher iCAP6500				工学研究科（化学・バイオ系）
671	原子吸光分析装置	ThermoFisher iCE3500				工学研究科（化学・バイオ系）
673	電子プローブマイクロアナライザー	島津製作所 EPMA-1720HT				工学研究科（化学・バイオ系）
674	電界放出型走査透過電子顕微鏡	日立ハイテク HD2700				工学研究科（化学・バイオ系）
675	電界放出型走査電子顕微鏡	日立ハイテク S-4800				工学研究科（化学・バイオ系）
676	低真空走査電子顕微鏡	日立ハイテク TM3000				工学研究科（化学・バイオ系）
060	和周波発生振動分光装置	東京インスツルメンツ ブロードバンドSFGフェムト秒二重共鳴(fs-SFG DR)	学内	本人利用	4,092 円/ 時間	多元物質科学研究所
060	和周波発生振動分光装置	東京インスツルメンツ ブロードバンドSFGフェムト秒二重共鳴(fs-SFG DR)	学外	本人利用	13,353 円/ 時間	多元物質科学研究所
062	モジュラーコンパクトレオメーター	Anton-Paar MCR302	学内	本人利用	885 円/ 時間	多元物質科学研究所
062	モジュラーコンパクトレオメーター	Anton-Paar MCR302	学外	本人利用	1,022 円/ 時間	多元物質科学研究所
093	走査型近接場ラマン分光装置	東京インスツルメンツ 共焦点顕微レーザーラマン Nano finder TERS	学内	本人利用	2,872 円/ 時間	多元物質科学研究所
093	走査型近接場ラマン分光装置	東京インスツルメンツ 共焦点顕微レーザーラマン Nano finder TERS	学外	本人利用	9,649 円/ 時間	多元物質科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部局
094	高速ラマンイメージングシステム	Renishaw inVia共焦点ラマン マイクロスコープ	本学に別途設置されている「東北大学多元物質科学研究所セントラル アナリティカルファシリティ（多元CAF）」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、東北大学多元物質科学研究所セントラルアナリティカルファシリティ（多元CAF）のページ (http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/research/caf.html) をご確認ください。			多元物質科学研究所
096	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス LEXT OLS	学内	本人利用	829 円/ 時間	多元物質科学研究所
096	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス LEXT OLS	学外	本人利用	1,097 円/ 時間	多元物質科学研究所
310	NMR装置 AVANCEIII600	Bruker BioSpin AVANCEIII600	本学に別途設置されている「東北大学多元物質科学研究所セントラル アナリティカルファシリティ（多元CAF）」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、東北大学多元物質科学研究所セントラルアナリティカルファシリティ（多元CAF）のページ (http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/research/caf.html) をご確認ください。			多元物質科学研究所
311	波長分散型蛍光X線分析装置 1式	リガク ZSX Primus II-TX				多元物質科学研究所
312	超伝導核磁気共鳴装置	Bruker BioSpin AVANCEIII 400R(特別仕様)				多元物質科学研究所
313	ICP発光分析装置	SPECTRO SPECTRO ARCOS				多元物質科学研究所
314	ラマン顕微鏡	(株)堀場製作所製 XploRA TYPE1-TIS532	学内	本人利用	3 円/ 時間	多元物質科学研究所
314	ラマン顕微鏡	(株)堀場製作所製 XploRA TYPE1-TIS532	学外	本人利用	151 円/ 時間	多元物質科学研究所
391	パルスEPR 電子スピン共鳴装置	Bruker BioSpin E580 10/12型	本学に別途設置されている「東北大学多元物質科学研究所セントラル アナリティカルファシリティ（多元CAF）」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、東北大学多元物質科学研究所セントラルアナリティカルファシリティ（多元CAF）のページ (http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/research/caf.html) をご確認ください。			多元物質科学研究所
393	高温NMR解析システム	JEOL RESONANCE JNM- ECA300WB FTNMR装置				多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所 EMGA-820				多元物質科学研究所
416	X線位相スキャナ		学内	本人利用	304 円/ 時間	多元物質科学研究所
416	X線位相スキャナ		学外	本人利用	560 円/ 時間	多元物質科学研究所
704	高速度カメラ①	(株)フォトン製 FASTCAM Mini AX type TT-SP	学内	本人利用	2,697 円/ 時間	多元物質科学研究所
704	高速度カメラ①	(株)フォトン製 FASTCAM Mini AX type TT-SP	学外	本人利用	3,143 円/ 時間	多元物質科学研究所
705	高速度カメラ②	(株)フォトン製 FASTCAM Nova S12 Type TT-SP	学内	本人利用	2,697 円/ 時間	多元物質科学研究所
705	高速度カメラ②	(株)フォトン製 FASTCAM Nova S12 Type TT-SP	学外	本人利用	5,243 円/ 時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	本人利用	74,550 円/ 時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	トライアル利用	8,400 円/ 1回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	試料調製	18,900 円/ 1回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学内	LTOによるバックアップ	31,500 円/ 1本	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	本人利用	74,550 円/ 時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	トライアル利用	8,400 円/ 1回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	試料調製	18,900 円/ 1回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	JEM-3300	学外	LTOによるバックアップ	31,500 円/ 1本	多元物質科学研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学内	本人利用	1,224 円/ 時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学内	委託利用	4,961 円/ 時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学内	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学内	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学外	本人利用	2,127 円/ 時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学外	委託利用	5,865 円/ 時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学外	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク SuperLab	学外	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD	学内	本人利用	1,285 円/ 時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD	学内	委託利用	5,022 円/ 時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD	学内	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD	学内	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD	学外	本人利用	1,704 円/ 時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD	学外	委託利用	5,442 円/ 時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD	学外	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical) X`Pert PRP MRD	学外	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部局
056	電子ビーム蛍光 X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	本人利用	1,589 円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光 X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	委託利用	5,327 円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光 X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光 X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光 X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	本人利用	3,034 円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光 X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	委託利用	6,772 円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光 X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光 X線解析システム②	日立 電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光 X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	本人利用	2,190 円/ 時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光 X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	委託利用	5,928 円/ 時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光 X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光 X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光 X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	サンプル容器	351 円/ 個	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光 X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	本人利用	3,573 円/ 時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光 X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	委託利用	7,311 円/ 時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光 X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光 X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所
057	電子ビーム蛍光 X線解析システム③	リガク X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	サンプル容器	351 円/ 個	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	本人利用	921 円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	委託利用	4,659 円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	本人利用	1,874 円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	委託利用	5,612 円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立 高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所
109	電子線描画装置	日本電子 JBX-9300SA	学内	本人利用	12,087 円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置	日本電子 JBX-9300SA	学内	委託利用	16,366 円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置	日本電子 JBX-9300SA	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置	日本電子 JBX-9300SA	学外	本人利用	31,215 円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置	日本電子 JBX-9300SA	学外	委託利用	35,494 円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置	日本電子 JBX-9300SA	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内	本人利用	10,160 円/ 時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内	委託利用	14,439 円/ 時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外	本人利用	25,391 円/ 時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外	委託利用	29,668 円/ 時間	電気通信研究所
111	FIB/SEM	Carl Zeiss Microscopy N-Vision40	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉 (3 F C R)	WAF3000	学内	本人利用	1,309 円/ 時間	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉 (3 F C R)	WAF3000	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉 (3 F C R)	WAF3000	学外	本人利用	3,105 円/ 時間	電気通信研究所
309	高纯净熱処理炉 (3 F C R)	WAF3000	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
562	SEM	日本電子 JSM-7401F	学内	本人利用	3,158 円/ 時間	電気通信研究所
562	SEM	日本電子 JSM-7401F	学内	委託利用	7,436 円/ 時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部局
562	SEM	日本電子 JSM-7401F	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
562	SEM	日本電子 JSM-7401F	学外	本人利用	4,083 円/ 時間	電気通信研究所
562	SEM	日本電子 JSM-7401F	学外	委託利用	8,361 円/ 時間	電気通信研究所
562	SEM	日本電子 JSM-7401F	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー①	ヤマト科学 PR500	学内	本人利用	46 円/ 時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー①	ヤマト科学 PR500	学内	委託利用	4,323 円/ 時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー①	ヤマト科学 PR500	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー①	ヤマト科学 PR500	学外	本人利用	350 円/ 時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー①	ヤマト科学 PR500	学外	委託利用	4,628 円/ 時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー①	ヤマト科学 PR500	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー	samco UV-1	学内	本人利用	64 円/ 時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー	samco UV-1	学内	委託利用	4,342 円/ 時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー	samco UV-1	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー	samco UV-1	学外	本人利用	192 円/ 時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー	samco UV-1	学外	委託利用	4,469 円/ 時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー	samco UV-1	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー②	ヤマト科学 V1000-TS	学内	本人利用	943 円/ 時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー②	ヤマト科学 V1000-TS	学内	委託利用	5,222 円/ 時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー②	ヤマト科学 V1000-TS	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー②	ヤマト科学 V1000-TS	学外	本人利用	1,549 円/ 時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー②	ヤマト科学 V1000-TS	学外	委託利用	5,828 円/ 時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー②	ヤマト科学 V1000-TS	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー①	SUSS MJB-4	学内	本人利用	2,933 円/ 時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー①	SUSS MJB-4	学内	委託利用	7,211 円/ 時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー①	SUSS MJB-4	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー①	SUSS MJB-4	学外	本人利用	3,852 円/ 時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー①	SUSS MJB-4	学外	委託利用	8,131 円/ 時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー①	SUSS MJB-4	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡	OLYMPUS MX50A/T	学内	本人利用	3 円/ 時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡	OLYMPUS MX50A/T	学内	委託利用	4,280 円/ 時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡	OLYMPUS MX50A/T	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡	OLYMPUS MX50A/T	学外	本人利用	123 円/ 時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡	OLYMPUS MX50A/T	学外	委託利用	4,401 円/ 時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡	OLYMPUS MX50A/T	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡	レーザーテック 1LM21	学内	本人利用	38 円/ 時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡	レーザーテック 1LM21	学内	委託利用	4,316 円/ 時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡	レーザーテック 1LM21	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡	レーザーテック 1LM21	学外	本人利用	38 円/ 時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡	レーザーテック 1LM21	学外	委託利用	4,316 円/ 時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡	レーザーテック 1LM21	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ	サンヨー電子 SC-701AT	学内	本人利用	7 円/ 時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ	サンヨー電子 SC-701AT	学内	委託利用	4,286 円/ 時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ	サンヨー電子 SC-701AT	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ	サンヨー電子 SC-701AT	学外	本人利用	73 円/ 時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ	サンヨー電子 SC-701AT	学外	委託利用	4,351 円/ 時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ	サンヨー電子 SC-701AT	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
570	スピコーター①	MIKASA 1H-360S	学内	本人利用	9 円/ 時間	電気通信研究所
570	スピコーター①	MIKASA 1H-360S	学内	委託利用	4,288 円/ 時間	電気通信研究所
570	スピコーター①	MIKASA 1H-360S	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
570	スピコーター①	MIKASA 1H-360S	学外	本人利用	153 円/ 時間	電気通信研究所
570	スピコーター①	MIKASA 1H-360S	学外	委託利用	4,431 円/ 時間	電気通信研究所
570	スピコーター①	MIKASA 1H-360S	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
571	スピコーター②	MIKASA MS-A150	学内	本人利用	18 円/ 時間	電気通信研究所
571	スピコーター②	MIKASA MS-A150	学内	委託利用	4,297 円/ 時間	電気通信研究所
571	スピコーター②	MIKASA MS-A150	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
571	スピコーター②	MIKASA MS-A150	学外	本人利用	63 円/ 時間	電気通信研究所
571	スピコーター②	MIKASA MS-A150	学外	委託利用	4,340 円/ 時間	電気通信研究所
571	スピコーター②	MIKASA MS-A150	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
572	スピコーター③	MIKASA MS-A150	学内	本人利用	18 円/ 時間	電気通信研究所
572	スピコーター③	MIKASA MS-A150	学内	委託利用	4,297 円/ 時間	電気通信研究所
572	スピコーター③	MIKASA MS-A150	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
572	スピコーター③	MIKASA MS-A150	学外	本人利用	76 円/ 時間	電気通信研究所
572	スピコーター③	MIKASA MS-A150	学外	委託利用	4,355 円/ 時間	電気通信研究所
572	スピコーター③	MIKASA MS-A150	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部局
573	スピコンター④	MIKASA MS-A200	学内	本人利用	16 円/ 時間	電気通信研究所
573	スピコンター④	MIKASA MS-A200	学内	委託利用	4,294 円/ 時間	電気通信研究所
573	スピコンター④	MIKASA MS-A200	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
573	スピコンター④	MIKASA MS-A200	学外	本人利用	175 円/ 時間	電気通信研究所
573	スピコンター④	MIKASA MS-A200	学外	委託利用	4,453 円/ 時間	電気通信研究所
573	スピコンター④	MIKASA MS-A200	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
574	ホットプレート①	PMC720	学内	本人利用	23 円/ 時間	電気通信研究所
574	ホットプレート①	PMC720	学内	委託利用	4,300 円/ 時間	電気通信研究所
574	ホットプレート①	PMC720	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
574	ホットプレート①	PMC720	学外	本人利用	29 円/ 時間	電気通信研究所
574	ホットプレート①	PMC720	学外	委託利用	4,308 円/ 時間	電気通信研究所
574	ホットプレート①	PMC720	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
575	ホットプレート②	アズワン HP-1SA	学内	本人利用	26 円/ 時間	電気通信研究所
575	ホットプレート②	アズワン HP-1SA	学内	委託利用	4,303 円/ 時間	電気通信研究所
575	ホットプレート②	アズワン HP-1SA	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
575	ホットプレート②	アズワン HP-1SA	学外	本人利用	30 円/ 時間	電気通信研究所
575	ホットプレート②	アズワン HP-1SA	学外	委託利用	4,309 円/ 時間	電気通信研究所
575	ホットプレート②	アズワン HP-1SA	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
576	ホットプレート③	アズワン HHP-230SQ	学内	本人利用	19 円/ 時間	電気通信研究所
576	ホットプレート③	アズワン HHP-230SQ	学内	委託利用	4,298 円/ 時間	電気通信研究所
576	ホットプレート③	アズワン HHP-230SQ	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
576	ホットプレート③	アズワン HHP-230SQ	学外	本人利用	35 円/ 時間	電気通信研究所
576	ホットプレート③	アズワン HHP-230SQ	学外	委託利用	4,314 円/ 時間	電気通信研究所
576	ホットプレート③	アズワン HHP-230SQ	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
577	恒温槽①	ヤマト科学 CTA401	学内	本人利用	9 円/ 時間	電気通信研究所
577	恒温槽①	ヤマト科学 CTA401	学内	委託利用	4,288 円/ 時間	電気通信研究所
577	恒温槽①	ヤマト科学 CTA401	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
577	恒温槽①	ヤマト科学 CTA401	学外	本人利用	37 円/ 時間	電気通信研究所
577	恒温槽①	ヤマト科学 CTA401	学外	委託利用	4,316 円/ 時間	電気通信研究所
577	恒温槽①	ヤマト科学 CTA401	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
578	恒温槽②	KELK ACE-10AN	学内	本人利用	5 円/ 時間	電気通信研究所
578	恒温槽②	KELK ACE-10AN	学内	委託利用	4,282 円/ 時間	電気通信研究所
578	恒温槽②	KELK ACE-10AN	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
578	恒温槽②	KELK ACE-10AN	学外	本人利用	26 円/ 時間	電気通信研究所
578	恒温槽②	KELK ACE-10AN	学外	委託利用	4,305 円/ 時間	電気通信研究所
578	恒温槽②	KELK ACE-10AN	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
580	UVキュア	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	本人利用	65 円/ 時間	電気通信研究所
580	UVキュア	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	委託利用	4,343 円/ 時間	電気通信研究所
580	UVキュア	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
580	UVキュア	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	本人利用	422 円/ 時間	電気通信研究所
580	UVキュア	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	委託利用	4,699 円/ 時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部局
580	UVキュア	USHIO UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機	ヤマト科学 ADP300	学内	本人利用	24 円/ 時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機	ヤマト科学 ADP300	学内	委託利用	4,301 円/ 時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機	ヤマト科学 ADP300	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機	ヤマト科学 ADP300	学外	本人利用	74 円/ 時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機	ヤマト科学 ADP300	学外	委託利用	4,352 円/ 時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機	ヤマト科学 ADP300	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	本人利用	473 円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	委託利用	4,751 円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM	日立ハイテクサイエンス nano cute	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	本人利用	762 円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	委託利用	5,040 円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM	日立ハイテクサイエンス nano cute	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計	Bruker DEKTAK XT-A	学内	本人利用	1,352 円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計	Bruker DEKTAK XT-A	学内	委託利用	5,630 円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計	Bruker DEKTAK XT-A	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計	Bruker DEKTAK XT-A	学外	本人利用	1,787 円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計	Bruker DEKTAK XT-A	学外	委託利用	6,064 円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計	Bruker DEKTAK XT-A	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー②	SUSS MJB-3	学内	本人利用	38 円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー②	SUSS MJB-3	学内	委託利用	4,316 円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー②	SUSS MJB-3	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー②	SUSS MJB-3	学外	本人利用	952 円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー②	SUSS MJB-3	学外	委託利用	5,231 円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー②	SUSS MJB-3	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置②	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL200	学内	本人利用	4,874 円/ 時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置②	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL200	学内	委託利用	9,151 円/ 時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置②	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL200	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置②	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL200	学外	本人利用	9,747 円/ 時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置②	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL200	学外	委託利用	14,024 円/ 時間	電気通信研究所
585	レーザー描画装置②	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL200	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー③	SUSS MJB-3	学内	本人利用	122 円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー③	SUSS MJB-3	学内	委託利用	4,401 円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー③	SUSS MJB-3	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー③	SUSS MJB-3	学外	本人利用	993 円/ 時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部門
586	マスクアライナー③	SUSS MJB-3	学外	委託利用	5,271 円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー③	SUSS MJB-3	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置 (Si室)	システムサービス	学内	本人利用	1,861 円/ 時間	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置 (Si室)	システムサービス	学内	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置 (Si室)	システムサービス	学外	本人利用	2,673 円/ 時間	電気通信研究所
587	ナノスピ熱処理装置 (Si室)	システムサービス	学外	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
588	分光エリプソ (Si室)	大塚電子 FE-5000	学内	本人利用	891 円/ 時間	電気通信研究所
588	分光エリプソ (Si室)	大塚電子 FE-5000	学内	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
588	分光エリプソ (Si室)	大塚電子 FE-5000	学外	本人利用	1,695 円/ 時間	電気通信研究所
588	分光エリプソ (Si室)	大塚電子 FE-5000	学外	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置 (NOVA) (Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学内	本人利用	9,541 円/ 時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置 (NOVA) (Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学内	技術指導料	3,481 円/ 時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置 (NOVA) (Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学外	本人利用	14,877 円/ 時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置 (NOVA) (Si室)	島津製作所 AXIS-NOVA	学外	技術指導料	3,481 円/ 時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム (Si室)	島津製作所 FT-3500	学内	本人利用	12 円/ 時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム (Si室)	島津製作所 FT-3500	学外	本人利用	1,859 円/ 時間	電気通信研究所
591	4 探針抵抗率測定器 (Si室)	ナプソン RT-70/RG-7	学内	本人利用	4 円/ 時間	電気通信研究所
591	4 探針抵抗率測定器 (Si室)	ナプソン RT-70/RG-7	学内	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
591	4 探針抵抗率測定器 (Si室)	ナプソン RT-70/RG-7	学外	本人利用	98 円/ 時間	電気通信研究所
591	4 探針抵抗率測定器 (Si室)	ナプソン RT-70/RG-7	学外	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング (Si室)	アネルバ	学内	本人利用	3,331 円/ 時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング (Si室)	アネルバ	学内	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング (Si室)	アネルバ	学外	本人利用	5,293 円/ 時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング (Si室)	アネルバ	学外	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム (Si室)	オミクロン	学内	本人利用	600 円/ 時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム (Si室)	オミクロン	学内	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム (Si室)	オミクロン	学外	本人利用	11,888 円/ 時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム (Si室)	オミクロン	学外	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム (3FCR)	アネルバ EVP-38877	学内	本人利用	2,903 円/ 時間	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム (3FCR)	アネルバ EVP-38877	学内	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム (3FCR)	アネルバ EVP-38877	学外	本人利用	5,425 円/ 時間	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム (3FCR)	アネルバ EVP-38877	学外	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
595	ボンダー (A408)	ウェストボンド 7476D	学内	本人利用	937 円/ 時間	電気通信研究所
595	ボンダー (A408)	ウェストボンド 7476D	学外	本人利用	1,122 円/ 時間	電気通信研究所
596	スパッタ装置 (3FCR)	アネルバ	学内	本人利用	2,111 円/ 時間	電気通信研究所
596	スパッタ装置 (3FCR)	アネルバ	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
596	スパッタ装置 (3FCR)	アネルバ	学外	本人利用	3,382 円/ 時間	電気通信研究所
596	スパッタ装置 (3FCR)	アネルバ	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
597	金属蒸着装置 (3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学内	本人利用	2,755 円/ 時間	電気通信研究所
597	金属蒸着装置 (3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学内	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
597	金属蒸着装置 (3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学外	本人利用	3,702 円/ 時間	電気通信研究所
597	金属蒸着装置 (3FCR)	日本シード研究所 ESE-09	学外	技術指導料	6,760 円/ 時間	電気通信研究所
598	高性能マイクロカー測定装置	NEOARK BH-PI918M	学内	本人利用	9,430 円/ 時間	電気通信研究所
599	多機能薄膜材料評価X線回折装置	Bruker D8 Discover	学内	本人利用	8,496 円/ 時間	電気通信研究所
600	接触段差計	アルバック製 D e k T a k 1 5 0	学内	本人利用	8,895 円/ 時間	電気通信研究所
601	半導体パラメータ・アナライザ	Agilent B1500A	学内	本人利用	8,367 円/ 時間	電気通信研究所
602	マスクアライナー (3 F C R)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学内	本人利用	1,923 円/ 時間	電気通信研究所
602	マスクアライナー (3 F C R)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学内	技術指導料	4,579 円/ 時間	電気通信研究所
602	マスクアライナー (3 F C R)	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学外	本人利用	2,794 円/ 時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部門
602	マスクライナー（3FCR）	ズース・マイクロテック社製 MJB4	学外	技術指導料	4,579 円/ 時間	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201- TU375	学内	本人利用	2,243 円/ 時間	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201- TU375	学内	技術指導料	4,579 円/ 時間	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201- TU375	学外	本人利用	3,218 円/ 時間	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク社製 DDB-201- TU375	学外	技術指導料	4,579 円/ 時間	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	ブルカー社製 Dimension Icon	学内	本人利用	4,248 円/ 時間	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	ブルカー社製 Dimension Icon	学内	技術指導料	4,579 円/ 時間	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	ブルカー社製 Dimension Icon	学外	本人利用	6,380 円/ 時間	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	ブルカー社製 Dimension Icon	学外	技術指導料	4,579 円/ 時間	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック社製 H1200	学内	本人利用	779 円/ 時間	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック社製 H1200	学内	技術指導料	4,579 円/ 時間	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック社製 H1200	学外	本人利用	1,731 円/ 時間	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック社製 H1200	学外	技術指導料	4,579 円/ 時間	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置 （ANELVAミリング）	ANELVA EVP-38763	学内	本人利用	12,382 円/ 時間	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置（絶縁膜 堆積）	ANELVA EVP-38779	学内	本人利用	11,993 円/ 時間	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック(株)製 CC-200	学内	本人利用	11,161 円/ 時間	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック(株)製 NE-550	学内	本人利用	10,677 円/ 時間	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE(RIE#1)	アルバック(株)製 NE-550	学内	本人利用	11,000 円/ 時間	電気通信研究所
703	超低振動無冷媒オブティカルクライス タツs50	(米) モンタ・インストルメンツ社製	学内	本人利用	12,019 円/ 時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学内	本人利用	547 円/ 時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学内	委託利用	4,285 円/ 時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学内	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学内	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学外	本人利用	798 円/ 時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学外	委託利用	4,536 円/ 時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学外	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
724	X線回折装置	リガク X線回折装置(RINT) RINT2200	学外	記録用CD	26 円/ 枚	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置 (PYS) AC-2	学内	本人利用	1,097 円/ 時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置 (PYS) AC-2	学内	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置 (PYS) AC-2	学外	本人利用	1,309 円/ 時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置(PYS)	日立 大気中光電子分光装置 (PYS) AC-2	学外	技術指導料	3,736 円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置①	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL66+	学内	本人利用	5,233 円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置①	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL66+	学内	委託利用	9,510 円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置①	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL66+	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置①	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL66+	学外	本人利用	10,643 円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置①	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL66+	学外	委託利用	14,921 円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置①	ハイデルベルグ・インストルメ ンツ DWL66+	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡	日立 SU8600	学内	本人利用	4,542 円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡	日立 SU8600	学内	委託利用	8,820 円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡	日立 SU8600	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡	日立 SU8600	学外	本人利用	7,553 円/ 時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込）/ その他の手続			管理部門
			学外	委託利用	11,831 円/ 時間	
772	電界放出形走査電子顕微鏡	日立 SU8600	学外	委託利用	11,831 円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡	日立 SU8600	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器	アズワン USK-3R	学内	本人利用	11 円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器	アズワン USK-3R	学内	委託利用	4,289 円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器	アズワン USK-3R	学内	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器	アズワン USK-3R	学外	本人利用	15 円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器	アズワン USK-3R	学外	委託利用	4,294 円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器	アズワン USK-3R	学外	技術指導料	4,277 円/ 時間	電気通信研究所
747	人工糖鎖医薬品研究開発システム (No.1)	日本電子 JNM-ECA600	ご利用手続きについては「薬学研究科中央機器室」機器担当者までお問い合わせください。			薬学研究科
748	人工糖鎖医薬品研究開発システム (No.2)	日本電子 JNM-ECA600				薬学研究科
749	高分解能核磁気共鳴装置 (No.3)	日本電子 JNM-ECA600				薬学研究科
750	核磁気共鳴装置 (バリアン)	Varian 400-MRDS型				薬学研究科
013	有機ハロゲン・硫黄分析システム	ヤナコ機器開発研究所YHS-11(構成:燃焼炉HNS-18L2,吸収ユニットHSU-45,注入ユニットIJ-20s)高速イオンクロマトグラフシステムIC-8100	本学に別途設置されている「巨大分子解析研究センター 解析研究部門」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、巨大分子解析研究センター 解析研究部門のページ (http://www.kiki.chem.tohoku.ac.jp/index.html) をご確認ください。			理学研究科
015	発光分析装置 (高周波プラズマ発光分析装置)	島津製作所 ICPE-9000	本学に別途設置されている「ナノテク融合技術支援センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくこととなりますので、ナノテク融合技術支援センターのページ (http://cints-tohoku.jp/index.htm) をご確認ください。			理学研究科
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	本人利用	3,987 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	多分力天秤	620 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	インテリジェントイーサネット圧カスキャナ	392 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	ハイスピードカメラ	562 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	感圧塗料計測システム	2,245 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	磁力支持天秤装置	3,937 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	OKK製 立型マシニングセンタ	1,639 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	キーエンス製 3Dプリンタ	1,804 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	FANUC製小型立型マシニングセンタ	1,102 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	本人利用	10,340 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	委託利用	14,960 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	低乱熱伝達風洞実験室	4,816 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	低乱熱伝達風洞整流室	1,083 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	多分力天秤	3,753 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	インテリジェントイーサネット圧カスキャナ	775 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ハイスピードカメラ	3,996 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	感圧塗料計測システム	7,155 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	磁力支持天秤装置	75,541 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	OKK製 立型マシニングセンタ	10,065 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	キーエンス製 3Dプリンタ	3,004 円/ 時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	FANUC製小型立型マシニングセンタ	3,845 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	本人利用	1,528 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	多分力天秤	620 円/ 時間	流体科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金(円:税込) / その他の手続			管理部門
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	インテリジェントイーサネット 圧カスキャナ	392 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	ハイスピードカメラ	562 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	感圧塗料計測システム	2,245 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	ステレオPIVシステム	2,124 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	時系列PIVシステム	3,124 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	OKK製 立型マシニングセンタ	1,639 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	キーエンス製 3Dプリンタ	1,804 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学内	FANUC製 小型マシニングセンタ	1,102 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	本人利用	7,303 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	委託利用	11,923 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	技術支援: 教員相当による専門 技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用支援(甲): 技術職員相当 による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用支援(乙): 技術職員相当に よる利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	利用補助: 学生相当による利用 支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	小型低乱風洞実験室	3,213 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	多分力天秤	3,753 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	インテリジェントイーサネット 圧カスキャナ	775 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ハイスピードカメラ	3,996 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	感圧塗料計測システム	7,176 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	ステレオPIVシステム	7,398 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	時系列PIVシステム	11,190 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	OKK製 立型マシニングセンタ	10,065 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	キーエンス製 3Dプリンタ	3,004 円/ 時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所製 単路回流型風洞	学外	FANUC製 小型マシニングセンタ	3,845 円/ 時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社 製 射出速度 100m/s ~6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火 薬銃、二段式軽ガス銃)	学内	本人利用	7,967 円/ 時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社 製 射出速度 100m/s ~6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火 薬銃、二段式軽ガス銃)	学内	施設等使用料	388 円/ 時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社 製 射出速度 100m/s ~6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火 薬銃、二段式軽ガス銃)	学内	超音速弾道可視化計測システム	6,956 円/ 時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社 製 射出速度 100m/s ~6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火 薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	本人利用	14,511 円/ 時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社 製 射出速度 100m/s ~6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火 薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	技術指導料: 高速現象実験研究 に関わる計測方法、解析方法等 に関わる技術指導	6,540 円/ 時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社 製 射出速度 100m/s ~6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火 薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	施設等使用料	388 円/ 時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	(米)Physics Applications Inc社 製 射出速度 100m/s ~6km/s、 射出形式(1段式ガス銃、一段式火 薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	超音速弾道可視化計測システム	9,878 円/ 時間	流体科学研究所
308	超高分解能電界放出形走査電子 顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ社製 S- 5200(整備品)	学内	本人利用	5,166 円/ 時間	流体科学研究所
413	中性粒子ビームエッチング装置	パナソニックアクトリブリューションズ E620R&D特型	学内	本人利用	5,043 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	本人利用	562 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	技術支援: 教員相当による専門 技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部局
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	本人利用	3,996 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	委託利用	8,616 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	低乱熱伝達風洞実験室	4,816 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	小型低乱風洞実験室	3,213 円/ 時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ	Photron Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	その他の実験室	1,224 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	本人利用	2,245 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	本人利用	7,176 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	委託利用	11,796 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	低乱熱伝達風洞実験室	4,816 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	小型低乱風洞実験室	3,213 円/ 時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム		学外	その他の実験室	1,224 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学内	本人利用	2,124 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部局
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ： FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ： FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学外	本人利用	7,398 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ： FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学外	委託利用	12,018 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ： FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ： FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ： FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学外	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ： FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ： FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学外	低乱熱伝達風洞実験室	4,816 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ： FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学外	小型低乱風洞実験室	3,213 円/ 時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ： FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz), ダブルパルスレーザー：Evergreen 200mJ	学外	その他の実験室	1,224 円/ 時間	流体科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部局
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	本人利用	3,124 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学内	ハイスピードカメラ	562 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	本人利用	11,190 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	委託利用	15,810 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部局
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	低乱熱伝達風洞実験室	4,816 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	小型低乱風洞実験室	3,213 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	その他の実験室	1,224 円/ 時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：Photron SA-X2(1024pix×1024pix 12,000fps), ダブルパルスレーザー：Photonics Industries DM-30-527	学外	ハイスピードカメラ	3,996 円/ 時間	流体科学研究所
653	キーエンス製 3Dプリンタ	KEYENCE AGILISTA-3100	学内	委託利用	1,804 円/ 時間	流体科学研究所
653	キーエンス製 3Dプリンタ	KEYENCE AGILISTA-3100	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
653	キーエンス製 3Dプリンタ	KEYENCE AGILISTA-3100	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
653	キーエンス製 3Dプリンタ	KEYENCE AGILISTA-3100	学内	利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
653	キーエンス製 3Dプリンタ	KEYENCE AGILISTA-3100	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	(米)Vision Research社製 Phantom v 2011	学内	本人利用	6,555 円/ 時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	(米)Vision Research社製 Phantom v 2011	学内	技術指導料：高速度撮影に関わる方法、解析等に関わる技術指導	6,540 円/ 時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	(米)Vision Research社製 Phantom v 2011	学内	施設等使用料	388 円/ 時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	委託利用	1,639 円/ 時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK VM-53R	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	委託利用	1,102 円/ 時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/ 時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援	5,775 円/ 時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用支援(乙)：技術職員相当による利用支援	4,620 円/ 時間	流体科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー、型式等	利用料金（円：税込） / その他の手続			管理部局
692	FANUC製小型立型マシニングセンター	FANUC ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/ 時間	流体科学研究所